(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平6-105826

(43)公開日 平成6年(1994)4月19日

(51)Int.Cl. ⁵ A 6 1 B 5/107	識別記号	庁内整理番号	FI	技術表示箇所
G01B 11/24	Z	9108-2F		·
G 0 6 F 15/62	390 Z			
Q 0 0 1 10,02	4 1 5	9287-5L		
		8932-4C	A 6 1 B	5/ 10 3 0 0 Q
	••			審査請求 未請求 請求項の数11(全 33 頁)
(21)出願番号	特願平4-277838		(71)出願人	000001959
•				株式会社資生堂
(22)出願日	平成 4 年(1992) 9 月22日			東京都中央区銀座7丁目5番5号
			(71)出願人	592201047
				小沢 慎治
		•		神奈川県鎌倉市岡本 1 -19-3 -305
			(72)発明者	諸沢 敬二
•				神奈川県横浜市港北区新羽町1050 資生堂
				研究所内
			(72)発明者	
				神奈川県横浜市港北区新羽町1050 資生堂
				研究所内
			(74)代理人	
				最終頁に続く

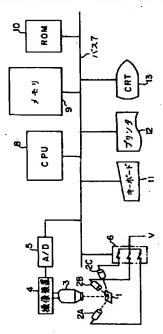
(54)【発明の名称】 皮膚表面に関する画像からの3次元形状の復元に基づく皮膚表面形状の特徴抽出装置

(57)【要約】

【目的】 皮膚表面の微細な形状を抽出して、皮膚の性状、肌質、それらの加齢による変化を判定するための指標となる特徴情報を抽出する装置に関し、皮膚表面の3次元の形状を復元することを可能にし、それによってより正確な皮膚表面形状の特徴を抽出可能とすることを目的とする。

【構成】 CPU8は、バス7を介してスイッチ6を制御することによって、レプリカ面1を第1光源2A、第2光源2B、及び第3光源2Cによって順次照明させ、各照明動作に対応して拡大光学系3、撮像装置4、及びA/D変換器5から得られる3枚の画像データを、バス7を介してメモリ9に順次取り込む。CPU8は、これら3枚の画像データの各画素の明度値から、レプリカ面画像の各画素位置におけるレプリカ面1のグラディエントを計算し、そのグラディエントに基づいて、皮膚表面の3次元形状に関する種々の特徴パラメータを抽出する。

本発明による皮膚表面形状の特数抽出装置の構成図



【特許請求の範囲】

【請求項1】 皮膚表面形状を照明する照明手段と、 前記皮膚表面形状を撮像し、該皮膚表面形状の各平面位 置に対応する各画素位置の明度値を表すディジタル画像 データを出力する撮像手段と、

前記照明手段による複数の光源方向からの照明に対応して前記撮像手段からそれぞれ得られる複数枚の前記ディジタル画像データを記憶する画像データ記憶手段と、前記複数の光源方向の情報と前記複数枚のディジタル画像データから得られる明度値に基づいて、前記各画素位置における前記皮膚表面形状の勾配を抽出する勾配抽出手段と、

前記勾配抽出手段により抽出された前記各画素位置毎に おける前記皮膚表面形状の勾配に基づいて、前記皮膚表 面形状に関する特徴情報を抽出する特徴情報抽出手段 と

を有することを特徴とする皮膚表面に関する画像からの 3次元形状の復元に基づく皮膚表面形状の特徴抽出装 置。

【請求項2】 皮膚表面形状を照明する照明手段と、 前記皮膚表面形状を撮像し、該皮膚表面形状の各平面位 置に対応する各画素位置の明度値を表すディジタル画像 データを出力する撮像手段と、

前記照明手段による複数の光源方向からの照明に対応して前記撮像手段からそれぞれ得られる複数枚の前記ディジタル画像データを記憶する画像データ記憶手段と、前記複数の光源方向の情報と前記複数枚のディジタル画像データから得られる明度値に基づいて、前記各画素位置における前記皮膚表面形状の勾配を抽出する勾配抽出手段と、

前記勾配抽出手段により抽出された前記各画素位置毎に おける前記皮膚表面形状の勾配に基づいて、前記皮膚表 面形状の1つである皮溝の形状に関する特徴情報と、前 記皮膚表面形状の1つである前記皮溝の交点領域の形状 に関する特徴情報のうち、少なくとも1つ以上を抽出す る特徴情報抽出手段と、

を有することを特徴とする皮膚表面に関する画像からの 3次元形状の復元に基づく皮膚表面形状の特徴抽出装 置。

【請求項3】 皮膚表面形状を照明する照明手段と、前記皮膚表面形状を撮像し、該皮膚表面形状の各平面位置に対応する各画素位置の明度値を表すディジタル画像データを出力する撮像手段と、

前記照明手段による複数の光源方向からの照明に対応して前記撮像手段からそれぞれ得られる複数枚の前記ディジタル画像データを記憶する画像データ記憶手段と、前記複数の光源方向の情報と前記複数枚のディジタル画像データから得られる明度値に基づいて、前記各画素位置における前記皮膚表面形状の勾配を抽出する勾配抽出手段と、

前記勾配抽出手段により抽出された前記各画素位置毎における前記皮膚表面形状の勾配に基づいて、前記皮膚表面形状の1つである皮溝の形状の領域に関する特徴情報と、前記皮溝の形状の面積に関する特徴情報と、前記皮溝の形状の病に関する特徴情報と、前記皮溝の形状の幅に関する特徴情報と、前記皮溝の形状の長さに関する特徴情報と、前記皮溝の形状の数に関する特徴情報と、前記皮溝の交点領域の形状における毛孔の存在する割合に関する特徴情報と、前記皮溝の交点領域の形状における毛孔の存在する割合に関する特徴情報と、前記皮溝の交点領域の形状における毛孔の存在する割合に関する特徴情報と、前記皮溝の交点領域の形状における毛孔の大きさに関する特徴情報のうち、少なくとも1つ以上を抽出する特徴情報抽出手段と、

を有することを特徴とする皮膚表面に関する画像からの 3次元形状の復元に基づく皮膚表面形状の特徴抽出装 置。

【請求項4】 前記特徴情報抽出手段は、前記勾配抽出手段により抽出された前記各画素位置毎における前記皮膚表面形状の勾配、該勾配の強度、該勾配の方向、又は該勾配の変化の程度の少なくとも1つ以上の情報に基づいて、前記特徴情報を抽出する、

ことを特徴とする請求項1乃至3の何れか1項に記載の 皮膚表面に関する画像からの3次元形状の復元に基づく 皮膚表面形状の特徴抽出装置。

【請求項5】 前記特徴情報抽出手段は、前記勾配抽出手段により抽出された前記各画素位置毎における前記皮膚表面形状の勾配の強度を計算し、該勾配の強度に基づいて、前記皮溝の形状の領域及び前記皮溝の形状の面積に関する特徴情報を抽出する、

ことを特徴とする請求項3に記載の皮膚表面に関する画像からの3次元形状の復元に基づく皮膚表面形状の特徴抽出装置。

【請求項6】 前記特徴情報抽出手段は、前記勾配抽出手段により抽出された前記各画素位置毎における前記皮膚表面形状の勾配の方向を計算し、該勾配の方向に基づいて、前記皮溝の形状の方向に関する特徴情報を抽出する。

ことを特徴とする請求項3に記載の皮膚表面に関する画像からの3次元形状の復元に基づく皮膚表面形状の特徴抽出装置。

【請求項7】 前記特徵情報抽出手段は、前記勾配抽出 手段により抽出された前記各画素位置毎における前記皮 膚表面形状の勾配を前記特徴情報として抽出される前記 皮溝の形状の領域内で積分し、該積分の結果に基づい て、前記皮溝の形状の深さ及び前記皮溝の形状の幅に関 する特徴情報を抽出する、

ことを特徴とする請求項3に記載の皮膚表面に関する画像からの3次元形状の復元に基づく皮膚表面形状の特徴

抽出装置。

【請求項8】 前記皮溝の形状の領域に関する特徴情報、前記皮溝の形状の方向に関する特徴情報又は前記皮溝の形状の深さに関する特徴情報に基づいて、前記皮溝の形状の長さに関する特徴情報及び前記皮溝の形状の数に関する特徴情報を抽出する、

ことを特徴とする請求項3に記載の皮膚表面に関する画像からの3次元形状の復元に基づく皮膚表面形状の特徴抽出装置。

【請求項9】 前記照明手段によって照明され、前記撮 10 像手段によって撮像される前記皮膚表面形状は、皮膚表 面を型取り材料によって型取りした皮膚表面レプリカの 表面の形状である、

ことを特徴とする請求項1乃至8の何れか1項に記載の 皮膚表面に関する画像からの3次元形状の復元に基づく 皮膚表面形状の特徴抽出装置。

【請求項10】 前記照明手段によって照明され、前記 撮像手段によって撮像される前記皮膚表面形状は、皮膚 表面の直接形状である、

ことを特徴とする請求項1乃至8の何れか1項に記載の 皮膚表面に関する画像からの3次元形状の復元に基づく 皮膚表面形状の特徴抽出装置。

【請求項11】 前記勾配抽出手段は、

前記各画素位置毎に、前記複数の光源方向の情報と前記 複数枚のディジタル画像データから得られる現在の前記 画素位置に対応する複数個の明度値に基づいて前記皮膚 表面形状の勾配を推定し、

その後、隣接する前記画素位置間で前記推定された勾配が最も滑らかになるという条件と、前記皮膚表面形状を実際に撮像して得られる前記複数の光源方向に対応する複数の明度値と前記推定された勾配に基づいて計算される前記複数の光源方向に対応する複数の反射強度との前記各画素位置毎の誤差が最小となるという条件の下で、前記各画素位置毎に前記推定された勾配を修正し、その結果得られる前記勾配を出力する、

ことを特徴とする請求項1乃至10の何れか1項に記載の皮膚表面に関する画像からの3次元形状の復元に基づく皮膚表面形状の特徴抽出装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、皮膚表面の微細な形状を抽出して、皮膚の性状、肌質、それらの加齢による変化を判定するための指標となる特徴情報を抽出する装置に関する。

[0002]

【従来の技術】皮膚表面には、皮溝と呼ばれる多数の細い溝、皮溝によって区画分けされる皮丘と呼ばれる小丘、皮溝の交差部分に存在する毛孔などが存在し、それらは皮膚の代謝等の生理的な影響を受けて変化する。

【0003】従って、皮膚表面形状からの特徴抽出は、

皮膚の性状、肌質、それらの加齢による変化を判定する ための指標となり、その指標は、皮膚の治療、診断、美 容衛生などの分野において有用な情報を提供する。

【0004】皮膚表面形状の特徴抽出の第1の従来例として、皮膚表面をシリコンラバーなどによって型取りして皮膚表面レプリカ(ネガティブレプリカ)を作成し、それを人間が光学顕微鏡で観察する方法がある。

【0005】皮膚表面形状の特徴抽出の第2の従来例として、皮膚表面レプリカを表面粗さ計を用いて触針により走査し、その結果得られた起伏値信号から起伏のピークの高さや数、ピーク面積などを求めて、皮膚表面レプリカ面の凹凸の程度を判定する方法がある。

【0006】皮膚表面形状の特徴抽出の第3の従来例として次のような方法がある。即ち、まず、皮膚表面又は皮膚表面レプリカ面を複数方向例えば3方向から照明する。次に、各照明毎に面を光学顕微鏡を介してテレビカメラで撮像し、その撮像信号をディジタル画像データに変換することによって、各照明画像についてその画像を構成する各画素毎の明度値を求める。そして、そのようにして得られた明度データに対して、ディジタル画像処理を施すことにより、幾何学的な特徴パラメータを抽出し、それを皮膚表面形状の特徴情報とする。

[0007]

【発明が解決しようとする課題】しかし、前述した第1 の従来例では、皮膚表面形状の特徴の評価が目視の所見 による主観的な評価であるため、評価が定量性に欠け、 評価に熟練を要するという問題点を有している。

【0008】また、前述した第2の従来例では、観察することのできる領域が局所にかたよってしまい面の全体の特徴を抽出するには必ずしも十分でなく、更に、特別な計測装置も必要になってしまうという問題点を有している。

【0009】更に、前述した第3の従来例では、面の全体的な特徴を定量的な特徴パラメータとして抽出することができるが、その特徴パラメータは明度値の分布のみに基づいて抽出されるため、例えば皮溝の深さに関する情報は明度分布から間接的に推定するしかない。

【0010】従って、皮溝の幅や方向性と皮溝の深さとの関係、又は皮溝の交点が本当に毛孔に対応しているか否かなどの判定結果を詳細に求めることは難しく、皮膚表面形状の特徴を必ずしも正確に抽出できないという問題点を有している。

【0011】本発明は、皮膚表面の3次元の形状を復元することを可能にし、それによってより正確な皮膚表面形状の特徴を抽出可能とすることを目的とする。

[0012]

【課題を解決するための手段】本発明は、まず、皮膚表面又は皮膚表面レプリカなどの皮膚表面形状を照明する 照明手段を有する。

【0013】次に、皮膚表面又は皮膚表面レプリカなど

の皮膚表面形状を撮像し、その皮膚表面形状の各平面位置に対応する各画素位置の明度値を表すディジタル画像データを出力する拡大光学系、CCDカメラ、及びA/D変換器などから構成される撮像手段を有する。

【0014】次に、照明手段による複数の光源方向からの照明に対応して撮像手段からそれぞれ得られる複数枚のディジタル画像データを記憶するRAM又はディスク記憶装置などの画像データ記憶手段を有する。

【0015】更に、複数の光源方向の情報と複数枚のデ ィジタル画像データから得られる明度値に基づいて、各 10 画素位置における皮膚表面形状の勾配(グラディエン ト)を抽出する、例えば所定の制御プログラムにより動 作するマイクロプロセッサなどで構成される勾配抽出手 段を有する。この勾配抽出手段は、例えば、各画素位置 毎に、複数の光源方向の情報と複数枚のディジタル画像 データから得られる現在の画素位置に対応する複数個の 明度値に基づき皮膚表面形状の勾配を推定し、その後、 隣接する画素位置間で推定された勾配が最も滑らかにな るという条件と、皮膚表面形状を実際に撮像して得られ る複数の光源方向に対応する複数の明度値と推定された 20 勾配に基づいて計算される複数の光源方向に対応する複 数の反射強度との各画素位置毎の誤差が最小となるとい う条件の下で、各画素位置毎に推定された勾配を修正 し、その結果得られる勾配を出力する。

【0016】そして、勾配抽出手段により抽出された各 画素位置毎における皮膚表面形状の勾配に基づいて、皮 膚表面形状に関する特徴情報を抽出する上記マイクロプ ロセッサなどで構成される特徴情報抽出手段を有する。

【0017】特徴情報抽出手段は、より具体的には、勾配抽出手段により抽出された各画素位置毎における皮膚表面形状の勾配に基づいて、皮膚表面形状の1つである皮溝の形状に関する特徴情報と、皮膚表面形状の1つである皮溝の交点領域の形状に関する特徴情報のうち、少なくとも1つ以上を抽出する。

【0018】皮溝の形状に関する特徴情報とは、皮溝の形状の領域に関する特徴情報、皮溝の形状の面積に関する特徴情報、皮溝の形状の面積に関する特徴情報、皮溝の形状の深さに関する特徴情報、皮溝の形状の幅に関する特徴情報、皮溝の形状の長さに関する特徴情報、又は皮溝の形状の数に関する特徴情報などである。

【0019】皮溝の交点領域の形状に関する特徴情報とは、皮溝の交点領域の形状の領域に関する特徴情報、皮溝の交点領域の形状における毛孔の存在する割合に関する特徴情報、皮溝の交点領域の形状における毛孔の深さに関する特徴情報、皮溝の交点領域の形状における毛孔の大きさに関する特徴情報などである。

【0020】そして、特徴情報抽出手段は、勾配抽出手段により抽出された各画素位置毎における皮膚表面形状の勾配、その勾配の強度、その勾配の方向、又はその勾配の変化の程度の少なくとも1つ以上の情報に基づい

て、特徴情報を抽出する。

[0021]

【作用】皮膚表面形状の3次元形状を各画素位置での勾配を介して抽出できるため、皮溝の形状の領域、面積、方向、深さ、幅、長さ、又は数に関する特徴情報、或いは、皮溝の交点領域の形状の領域、そこでの毛孔の存在する割合、毛孔の深さ、又は大きさに関する特徴情報などを詳細に評価することができる。

[0022]

【実施例】以下、図面を参照しながら本発明の実施例に つき詳細に説明する。

<皮膚表面形状の特徴抽出装置の構成>図1は、本発明による皮膚表面形状の特徴抽出装置の構成図である。

【0023】まず、レプリカ面1は、皮膚表面をシリコンラバーなどによって型取りして皮膚表面レプリカ(ネガティブレプリカ)の表面部分である。第1光源2A、第2光源2B、及び第3光源2Cは、レプリカ面1を選択的に照明し、仰角は例えば30度、照明方位は例えば相互に120度ずつずらされている。

【0024】スイッチ6は、バス7を介してCPU8によって制御され、第1光源2A、第2光源2B、及び第3光源2Cを順次選択的に点灯させる。拡大光学系3は、低倍率顕微鏡又は接写レンズによって構成され、所定の倍率のレプリカ面画像が得られるように構成される。

【0025】撮像装置4は、例えばCCD撮像素子であり、拡大光学系3を介して得られたレプリカ面画像を走査し、各画素位置の明度に従って振幅が変化するアナログ電気信号を発生する。

【0026】A/D変換器5は、撮像装置4から発生されたアナログ電気信号をディジタル画像データに変換する。メモリ9は、主記憶装置である半導体メモリを含み、画像データの記憶量に応じて補助記憶装置であるハードディスク装置又は光磁気ディスク装置などを含むように構成することもできる。

【0027】CPU8は、ROM9に記憶された制御プログラムに従って装置全体を制御する例えばマイクロプロセッサであり、まず、バス7を介してスイッチ6を制御することによって、レプリカ面1を第1光源2A、第2光源2B、及び第3光源2Cによって順次照明させ、各照明動作に対応してA/D変換器5から得られる3枚のディジタル画像データを、バス7を介してメモリ9に順次取り込む。

【0028】次に、CPU8は、メモリ9に取り込んだ3枚のディジタル画像データの各画素の明度値から、レプリカ面画像の各画素位置におけるレプリカ面1のグラディエント(勾配)を計算し、その計算結果をメモリ9に格納する。

【0029】続いて、CPU8は、メモリ9に得られた 上述のグラディエントに基づいて、皮膚表面の3次元形 7

状に関する種々の特徴パラメータを抽出し、その特徴パラメータをメモリ9に記憶すると共に、プリンタ12又はCRTディスプレイ12などに出力する。

【0030】また、ユーザは、キーボード10からCPU8に対して各種指示を行うことができる。

<3次元形状復元の原理>本発明では、レプリカ面1の各位置でのグラディエント(勾配)を得ることにより、レプリカ面1の各位置における深さ情報を得ること、即ち、レプリカ面1の3次元形状を復元することを可能としている。

【0031】そこで、上述の構成を有する皮膚表面形状の特徴抽出装置の具体的動作について説明する前に、3次元形状復元の原理について説明する。

撮像方向の決定

今、レプリカ面1に関して、図2に示されるように3次元のxyz座標を定義し、レプリカ面1上の任意の微小領域において、当該微小領域に垂直な方向を有する単位ベクトルを表面法線ベクトルn(下線は、それが付された記号がベクトル量であることを示す。以下同じ。)、当該微小領域から1つの光源に向かう方向を有する単位ベクトルを光源方向ベクトルn。、当該微小領域からそれを撮像するカメラの焦点に向かう方向を有する単位ベクトルを撮像方向ベクトルnoとする。また光源方向ベクトルnsと表面法線ベクトルnのなす角を入射角i、撮像方向ベクトルnoと表面法線ベクトルnのなす角を反射角e、撮像方向ベクトルnoと光源方向ベクトルnoと表面法線ベクトルnoと光源方向ベクトルnoと表面法線ベクトルnoと光源方向ベクトルnoと

【0032】なお、本実施例ではレプリカ面1はネガティブレプリカ面であるため、例えば皮溝は図面の上方向に盛り上がる形状として表され、皮溝の深さ方向は-z 30方向となる。

【0033】今、レプリカ面1が理想的な乱反射面(ランバート面と呼ばれる)であると仮定する。皮膚表面レプリカは、皮膚表面をシリコンラバーによって型取りしたものであるため、レプリカ面1はランバート面としての特性を十分に備えていると仮定できる。

【0034】この場合、レプリカ面1上の任意の微小領域における光の反射強度は、光源からの入射光(一様光)の入射角iの余弦 cosiにのみ比例する。即ち、ランバート面と仮定できるレプリカ面1上の任意の微小領域は、当該微小領域がどの反射角eで撮像されても同じ明るさに撮像される。これは、レプリカ面1で単位面積あたりに反射される光量は、反射角eの余弦値に比例して減少するが、ある任意の立体角内で撮像される当該微小領域の表面積は反射角eの余弦値に反比例して増加するため、結果的に、撮像される当該微小領域の明るさは撮像方向を示す反射角eによらず一定となるからである。

【0035】従って、ランバート面と仮定できるレプリカ面1の各点を撮像する場合には、各点に対する反射角 50

e は考慮する必要はなく、図1の拡大光学系3の光軸は、例えばレプリカ面1が置かれている面に対しほぼ直交する方向に定めればよい。

グラディエントと表面法線ベクトルとの関係

レプリカ面1の3次元形状を復元するためには、レプリカ面1を撮像して得たレプリカ面画像の各画素位置でのレプリカ面1のグラディエント(勾配)を求めることができればよい。各画素位置におけるグラディエントを求めることができれば、それらを一定の方向に積分することによって、レプリカ面1の3次元形状を復元できるからである。

【0036】今、図2で定義されるxyz座標中のレプリカ面1を次式で表す。

[0037]

【数1】

$$z = f(x, y)$$

【0038】この数式で表わされるレプリカ面1のグラディエントは、各要素が次式で示されるベクトル(p, q)によって表すことができる。

[0039]

【数2】

$$p = \frac{\partial (z)}{\partial x}$$

$$q = \frac{\partial (z)}{\partial y}$$

【0040】ここで、図2に示されるxyz座標中のレプリカ面1上の任意の微小領域は、次式で示される平面で近似することができる。

[0041]

【数3】

$$A x + B y + C z + D = 0$$

$$\therefore z = -\frac{A}{C} x - \frac{B}{C} y - \frac{D}{C}$$

【0042】数式2と数式3から、当該微小領域におけるグラディエントの要素p, qは、次式で表すことができる。

[0043]

$$p = \frac{\partial}{\partial x} \left(-\frac{A}{C} x - \frac{B}{C} y - \frac{D}{C} \right) = -\frac{A}{C}$$

$$q = \frac{\partial}{\partial y} \left(-\frac{A}{C} x - \frac{B}{C} y - \frac{D}{C} \right) = -\frac{B}{C}$$

【0044】従って、数式3と数式4より、当該微小領

9

域の平面は次式で表わされる。

[0045]

【数5】

$$z = p x + q y + K$$

(K:定数)

【0046】今、所定の点(0,0,K) は、数式5の方程式 を満足するため、この点は当該微小領域の平面上の点で ある。そして、この点から当該微小領域の平面上の任意 の点(x,y,z) へのベクトル(x,y,z-k) は、当該微小領域 10 の表面法線ベクトル \underline{n} と直交するため、これらのベクトルの内積は0である。

【0047】 ここで、図2 では、表面法線ベクトルnは -z 方向に向かうベクトルであるため、次式で表すことができる。

[0048]

【数6】

$$\underline{\mathbf{n}} = (\mathbf{n}_1, \mathbf{n}_2, -\mathbf{n}_3)$$

【0049】但し、 $n_3>0$ である。数式6で示される表面法線ベクトルnと微小領域上のベクトル(x,y,z-k)の内積が0であることより、次式が成立する。

[0050]

【数7】

$$\underline{n}(x,y) = (n_1(x,y), n_2(x,y), -n_3(x,y))$$

【0056】但し、表面法線ベクトル<u>n</u>は単位ベクトル であるから、次式が成立する。

[0057]

【数10】

$$n_1(x,y)^2 + n_2(x,y)^2 + n_3(x,y)^2 = 1$$

$$\therefore n_3 = \{1 - n_1(x, y)^2 - n_2(x, y)^2\}^{1/2}$$

$$p(x, y) = n_1(x, y) / \{1 - n_1(x, y)^2 - n_2(x, y)^2\}^{1/2}$$

$$q(x,y) = n_2(x,y) / \{1 - n_1(x,y)^2 - n_2(x,y)^2\}^{1/2}$$

【0060】従って、数式11の関係より、レプリカ面画像の各画素位置(x,y)での表面法線ベクトルn(x,y)を求めることができるならば、その位置でのグラディエント(p(x,y),q(x,y))を求めることができる。そして、各画素位置におけるグラディエントを一定の画素方向に積分すれば、各画素位置毎にz座標の値を推定することができ、レプリカ面103次元形状を復元できる。

各画素位置での表面法線ベクトルの推定

前述のように、レプリカ面 1 をランバート面と仮定すると、レプリカ面 1 上の任意の微小領域における光の反射強度は、光源からの入射光(一様光)の入射角 i の余弦cosiにのみ比例する。レプリカ面画像上でも同じ関係が成立し、各画素(x,y)における光の反射強度 R(x,y)は、光源からの入射光の入射角 i(x,y)の余弦cosi(x,y)にのみ比例し、従って、次式が成立する。

$$(x, y, z-K) \cdot (n_1, n_2, -n_3)$$

= $n_1 x + n_2 y - n_3 (z-K) = 0$

$$\therefore z = \frac{n_1}{n_3} + \frac{n_2}{n_3} + K$$

【0051】数式5と数式7より、次式が成立する。 【0052】

【数8】

$$p = n_1 / n_3$$

$$q = n_z / n_3$$

【0053】従って、数式8の関係より、レプリカ面1上の各微小領域での表面法線ベクトル \underline{n} = $(n_1, n_2, -n_3)$ を求めることができれば、当該微小領域でのグラディエント (p, q)を求めることができる。【0054】ここで、レプリカ面1上の各微小領域をレプリカ面画像の各画素位置(x,y)に対応させ、その位置でのグラディエントを(p(x,y), q(x,y))とし、また、数式6より、表面法線ベクトルを次式で表す。

[0055]

【数9】

【0058】数式8、数式9、及び数式10より、次式 が成立する。

[0059]

【数11】

 $(x,y)^2 - n_z(x,y)^2$ 1/2

[0061] [2] $R(x,y) = r_0(x,y) \cos i(x,y)$

【0062】但し、ro(x,y)は、画素位置(x,y)に対応するレプリカ面1における反射率である。今、1つの光源方向ベクトルns(画素位置(x,y)には依存しない)が決定されれば、図2に示される関係より、次式が成立する。

[0063]

【数13】

$$\cos i (x,y) = \underline{n_s} \cdot \underline{n(x,y)}$$

【0064】従って、数式12と数式13より、次式が成立する。

[0065]

 $R(x,y) = r_0(x,y) \{\underline{n_s} \cdot \underline{n_s}(x,y)\}$

【0066】ここで、レプリカ面1を実際に撮像して得 られる各画素位置(x,y) での明度値を I (x,y) とすれ ば、次の方程式が成立する。

[0067]

【数15】

$$[(x,y) = c(x,v) R(x,v)$$

【0068】但し、c(x,y) は、画素位置(x,y) での正 規化定数である。よって、数式14と数式15より、次 の方程式が成立する。

[0069]

【数16】 $I(x,y) = \alpha(x,y) \{\underline{n}_{s} \cdot \underline{n}(x,y)\}$

[0070]

【数17】

$$\alpha(x,y) = c(x,y) r_0(x,y)$$

【0071】数式16において、α(x,y) と表面法線ベー クトル<u>n(x,y)</u>が未知数であり、数式9と数式10よ り、n(x,y) は2つの未知数nı(x,y) とn2(x,y) を

$$N = \begin{pmatrix} \frac{n_{s1}}{n_{s2}} \\ \frac{n_{s2}}{n_{s3}} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} n_{s11}, n_{s12}, \\ n_{s21}, n_{s22}, \\ n_{s31}, n_{s32}, \end{pmatrix}$$

【0075】また、各画素位置(x,y) における3つの明 度値 l: (x,y) 、 l2 (x,y) 、及び l3 (x,y) を次式の 転置ベクトル<u>I (x,y)</u>で表す。

$$I(x,y) = (I, (x,y))$$

【0077】但し、数式19の右辺の括弧の右肩のT は、転置を示す。数式16、数式18、及び数式19よ り、次式が成立する。

[0078]

【数20】

$$I(x,y) = \alpha(x,y) N_n(x,y)$$

【0079】3つの光源方向ベクトルnsl、ns2、及び <u>ns3</u>が同一平面上になければ、数式18で示される行列 Nの逆行列N⁻¹が存在する。そこで、まず、表面法線べ クトルn(x,y) が単位ベクトルであることと、数式18 及び数式19を用いて、係数α(x,y) を、次式により求 めることができる。

[0080]

【数21】

$$\alpha(x,y) = |N^{-1}\underline{I}(x,y)|$$

【0081】更に、数式21で求まった係数α(x,y)、 数式9、数式10、数式18、及び数式19を用いて、 表面法線ベクトル<u>n (x,y)</u>を、次式により求めることが できる。

[0082]

【数22】

含む。従って、数式16は3つの未知数を含み、これら の未知数を決定するためには、3個の方程式が必要であ る。

【0072】そこで、図1に示されるように、3つの方 向に配置された第1光源2A、第2光源2B、及び第3 光源2℃でレプリカ面1を別々に照明し、各光源からの 照明に対応してレプリカ面1を実際に撮像して得られる 各画素位置(x,y) での3つの明度値と、上記3つの光源 の光源方向ベクトルとについて、数式16の方程式を解 10 くことによって、係数 α (x,y) 及び表面法線ベクトル n (x,y) を決定することができる。

【0073】まず、3つの光源方向ベクトル<u>nsl</u>、 ns2、及びns3は、それぞれ-z方向に向かう単位ベク トルであるため、数式6、数式10と同様の考えによ り、次式の行列Nで表すことができる。

[0074]

【数18】

[0076].

【数19】

$$\frac{I(x,y)}{\sigma} = (I_1(x,y), I_2(x,y), I_3(x,y))^{\mathsf{T}}$$
の右辺の括弧の右肩の $\frac{1}{\alpha(x,y)} = \frac{1}{\alpha(x,y)}$
数式 $\frac{1}{\alpha(x,y)} = \frac{1}{\alpha(x,y)}$

【0083】各画素位置でのグラディエントの推定 数式22で各画素位置(x,y) での表面法線ベクトル<u>n</u> (x,y)が求まったら、数式 11 により、各画素位置(x,y)y) でのグラディエント (p(x,y), q(x,y)) を求め ることができる。

緩和法によるグラディエントの修正

上述の原理に基づいて推定されたグラディエント(p (x,y), q(x,y))は、3つの光源からの照明に対応し てレプリカ面1を実際に撮像して得られるレプリカ面画 像の各画素位置(x,y) での3つの明度値から推定された 値であるため、多くの誤差を含んでいる。各画素位置 (x,y) での誤差 E (x,y) は、次式のように定義すること ができる。

[0084]

【0085】数式23において、まず、se(x,y)は、 画素位置(x,y) におけるレプリカ面1の滑らかさの誤差 を示しており、次式で定義される。

[0086]

13

【数24】

$$s_{x}(x,y) = \frac{1}{4} \{p_{x}(x,y)^{2} + p_{y}(x,y)^{2} + q_{x}(x,y)^{2} + q_{y}(x,y)^{2}\}$$

【0087】ここで、px(x,y)はグラディエントp(x,y)のx座標方向の1次偏微分であり、 $px(x,y)^2$ はグラディエントp(x,y)のx座標方向の2乗誤差を示す。この値が小さければグラディエントp(x,y)がx座標方向に滑らかであることを示している。同様に、py(x,y)と $py(x,y)^2$ はグラディエントp(x,y)のy座標方向の1次偏微分と2乗誤差を示し、qx(x,y)と $qx(x,y)^2$ はグラディエントq(x,y)のx座標方向の1次偏微分と2乗誤差を示し、 $qy(x,y)^2$ はグラディエントq(x,y)のy座標方向の1次偏微分と2乗誤差を示し、qy(x,y)と $qy(x,y)^2$ はグラディエントq(x,y)のy座標方向の1次偏微分と2乗誤差を示す。【0088】皮膚表面に対応するレプリカ面1は局所的には滑らかであるというヒューリスティックな要請があるために、結局、数式23における誤差xecxecxyy

さければ、画素位置(x,y) においてレプリカ面 1 は滑らかであるという条件を満足することになる。

【0089】次に、数式23において、re(x,y)は、 画素位置(x,y)において、レプリカ面1を実際に撮像して得られる3つの光源方向に対応する3つの明度値と、 推定により得られたグラディエント(p(x,y),q(x,y))に基づいて計算される3つの光源方向に対応する3つの正規化された光の反射強度との2乗誤差の線形結合を示しており、数式15の方程式に基づけば、次式で定義される。

【0090】 【数25】

$$r_e(x, y) = \lambda_1 \{I_i(x, y) - c(x, y) R_i(x, y)\}^2$$

+
$$\lambda_2$$
 {I₂ (x,y) - c(x,y) R₂ (x,y) } ²

$$+ \lambda_3 \{ I_3 (x,y) - c(x,y) R_3 (x,y) \}^2$$

【0091】ここで、 $I_1(x,y)$ 、 $I_2(x,y)$ 、及び $I_3(x,y)$ は、画素位置(x,y) においてレプリカ面1を実際に撮像して得られる3つの光源方向に対応する3つの明度値であり(数式19参照)、また、C(x,y) R I(x,y)、C(x,y) R I(x,y) 、及びI(x,y) 、及びI(x,y) において数式21により推定される係数I(x,y) と数式22により推定されるグラディエント(I(x,y) と数式22により推定されるグラディエント(I(x,y) 、I(x,y) 、I(x,y))に基づいて計算される3つの光源方向に対応する3つの正規化された光の反射強度である。また、I(x,y) 、及びI(x,y) に対する寄与率を定める定数であり、それぞれ経験的に定め

$$\frac{\partial E(x,y)}{\partial p(x,y)} = \frac{\partial s_e(x,y)}{\partial p(x,y)}$$

【0095】数式26の右辺第1項は、数式24より、 次式のように計算される。 られる。

【0092】数式23での誤差re(x,y)が十分に小さいならば、前述した数式15で示される反射率に関する方程式が成立することになり、グラディエント(p(x,y)) の推定値が正しいことになる。

【0093】画素位置(x,y) 毎に、数式 $23\sim25$ で定義される誤差E(x,y) を最小にするために、誤差E(x,y) をグラディエントp(x,y) で偏微分して得た式を0 とおくと、次式が得られる。

【0094】 【数26】

$$\frac{\partial f}{\partial p} + \frac{\partial f}{\partial p} \frac{(x,y)}{(x,y)} = 0$$

【0096】 【数27】

$$\frac{\partial s_{e}(x,y)}{\partial p(x,y)} = \frac{1}{4} \left\{ \frac{\partial \{p_{x}(x,y)^{2}\}}{\partial p(x,y)} + \frac{\partial \{p_{y}(x,y)^{2}\}}{\partial p(x,y)} + 0 + 0 \right\}$$

$$= \frac{1}{4} \left\{ \frac{\partial \{p_{x}(x,y)^{2}\}}{\partial x} \cdot \frac{\partial x}{\partial p(x,y)} + \frac{\partial \{p_{y}(x,y)^{2}\}}{\partial y} \cdot \frac{\partial y}{\partial p(x,y)} \right\}$$

$$= \frac{1}{4} \left\{ 2 p_{x}(x,y) p_{xx}(x,y) \frac{1}{p_{x}(x,y)} + 2 p_{y}(x,y) p_{yy}(x,y) \frac{1}{p_{y}(x,y)} \right\}$$

$$= 2 \times \frac{1}{4} \left\{ p_{xx}(x,y) + p_{yy}(x,y) \right\}$$

【0097】ここで、pxx(x,y) は画素位置(x,y) での グラディエント p(x,y) の x 座標方向の 2 次偏微分、 p yy(x,y) は画素位置(x,y) でのグラディエントp(x,y)の v 座標方向の 2 次偏微分であって、近似的に、それぞ 20 れ次式で示される。 [0098] 【数28】

 $p_{xx}(x,y) = \{p(x+1,y) - p(x,y)\} - \{p(x,y) - p(x-1,y)\}$ $p_{yy}(x,y) = \{p(x,y+1) - p(x,y)\} - \{p(x,y) - p(x,y-1)\}$

【0099】即ち、pxx(x,y) は近似的に、画素位置 (x,y) でのグラディエント p(x,y) と、画素位置(x,y)に x 方向に隣接する画素位置(x+1,y) 及び(x-1,y) での グラディエント p (x+1,y) 及び p (x-1,y) のそれぞれと で差分値を計算し、得られた2つの差分値の更に差分値 関する pyy(x,y) についても同様に求めることができ

【0100】数式27と数式28より、次式が得られ

[0101]

を計算することによって求めることができる。 y方向に 【数29】
$$\frac{\partial s_{a}(x,y)}{\partial p(x,y)} = 2 \times \frac{1}{4} \left\{ 4 p_{av}(x,y) - 4 p(x,y) \right\}$$
$$= 2 \times \left\{ p_{av}(x,y) - p(x,y) \right\}$$

【0 1 0 2】但し、pav(x,y) は、次式で表されるよう に、画素位置(x,y) の上下左右に隣接する4つの画素位 置でのグラディエントの平均値である。

[0103]

【数30】

 $p_{av}(x,y) = \frac{1}{4} \left\{ p(x+1,y) + p(x-1,y) + p(x,y+1) + p(x,y-1) \right\}$

【0104】一方、前述した数式26の右辺第2項は、 数式25より、次式のように計算される。

[0105]

【数31】

$$\frac{\partial r_{e}(x,y)}{\partial p(x,y)} = \frac{\partial}{\partial p(x,y)} \left\{ \lambda_{1} \left\{ I_{1}(x,y) - c(x,y) R_{1}(x,y) \right\}^{2} \right\} \\ + \frac{\partial}{\partial p(x,y)} \left\{ \lambda_{2} \left\{ I_{2}(x,y) - c(x,y) R_{2}(x,y) \right\}^{2} \right\} \\ + \frac{\partial}{\partial p(x,y)} \left\{ \lambda_{3} \left\{ I_{3}(x,y) - c(x,y) R_{3}(x,y) \right\}^{2} \right\} \\ = 2 \lambda_{1} \left\{ I_{1}(x,y) - c(x,y) R_{1}(x,y) \right\} \frac{\partial \left\{ - c(x,y) R_{1}(x,y) \right\}}{\partial p(x,y)} \\ + 2 \lambda_{2} \left\{ I_{2}(x,y) - c(x,y) R_{2}(x,y) \right\} \frac{\partial \left\{ - c(x,y) R_{2}(x,y) \right\}}{\partial p(x,y)} \\ + 2 \lambda_{3} \left\{ I_{3}(x,y) - c(x,y) R_{3}(x,y) \right\} \frac{\partial}{\partial p(x,y)} \\ = -2 \left\{ \lambda_{1} \left\{ I_{1}(x,y) - c(x,y) R_{1}(x,y) \right\} \frac{\partial}{\partial p(x,y)} \right\} \\ + \lambda_{2} \left\{ I_{2}(x,y) - c(x,y) R_{2}(x,y) \right\} \frac{\partial}{\partial p(x,y)} \\ + \lambda_{3} \left\{ I_{3}(x,y) - c(x,y) R_{3}(x,y) \right\} \frac{\partial}{\partial p(x,y)} \\ + \lambda_{3} \left\{ I_{3}(x,y) - c(x,y) R_{3}(x,y) \right\} \frac{\partial}{\partial p(x,y)} \\ \left\{ I_{3}(x,y) - c(x,y) R_{3}(x,y) \right\} \frac{\partial}{\partial p(x,y)} \\ \left\{ I_{3}(x,y) - c(x,y) R_{3}(x,y) \right\} \frac{\partial}{\partial p(x,y)} \\ \left\{ I_{3}(x,y) - c(x,y) R_{3}(x,y) \right\} \frac{\partial}{\partial p(x,y)} \\ \left\{ I_{3}(x,y) - c(x,y) R_{3}(x,y) \right\} \frac{\partial}{\partial p(x,y)} \\ \left\{ I_{3}(x,y) - c(x,y) R_{3}(x,y) \right\} \frac{\partial}{\partial p(x,y)} \\ \left\{ I_{3}(x,y) - c(x,y) R_{3}(x,y) \right\} \frac{\partial}{\partial p(x,y)} \\ \left\{ I_{3}(x,y) - c(x,y) R_{3}(x,y) \right\} \frac{\partial}{\partial p(x,y)} \\ \left\{ I_{3}(x,y) - c(x,y) R_{3}(x,y) \right\} \frac{\partial}{\partial p(x,y)} \\ \left\{ I_{3}(x,y) - c(x,y) R_{3}(x,y) \right\} \frac{\partial}{\partial p(x,y)} \\ \left\{ I_{3}(x,y) - c(x,y) R_{3}(x,y) \right\} \frac{\partial}{\partial p(x,y)} \\ \left\{ I_{3}(x,y) - c(x,y) R_{3}(x,y) \right\} \frac{\partial}{\partial p(x,y)} \\ \left\{ I_{3}(x,y) - c(x,y) R_{3}(x,y) \right\} \frac{\partial}{\partial p(x,y)} \\ \left\{ I_{3}(x,y) - c(x,y) R_{3}(x,y) \right\} \frac{\partial}{\partial p(x,y)} \\ \left\{ I_{3}(x,y) - c(x,y) R_{3}(x,y) \right\} \frac{\partial}{\partial p(x,y)} \\ \left\{ I_{3}(x,y) - c(x,y) R_{3}(x,y) \right\} \frac{\partial}{\partial p(x,y)} \\ \left\{ I_{3}(x,y) - c(x,y) R_{3}(x,y) \right\} \frac{\partial}{\partial p(x,y)} \\ \left\{ I_{3}(x,y) - c(x,y) R_{3}(x,y) \right\} \frac{\partial}{\partial p(x,y)} \\ \left\{ I_{3}(x,y) - c(x,y) R_{3}(x,y) \right\} \frac{\partial}{\partial p(x,y)} \\ \left\{ I_{3}(x,y) - c(x,y) R_{3}(x,y) \right\} \frac{\partial}{\partial p(x,y)} \\ \left\{ I_{3}(x,y) - c(x,y) R_{3}(x,y) \right\} \frac{\partial}{\partial p(x,y)} \\ \left\{ I_{3}(x,y) - c(x,y) R_{3}(x,y) \right\} \frac{\partial}{\partial p(x,y)} \\ \left\{ I_{3}(x,y) - c(x,y) R_{3}(x,y) \right\} \frac{\partial}{\partial p(x,y)} \\ \left\{ I_{3}(x,y) - c(x,y) R_{3}(x,y) \right\} \frac{\partial}{\partial p(x,y)} \\ \left\{ I_{3}(x,y) - c(x,y) R_{3}(x,y) \right\} \frac{\partial}{\partial p(x,y)} \\ \left\{ I$$

【0106】数式26、数式29、及び数式31より、

$$2 \times \{p_{av}(x,v) - p(x,v)\}$$

$$-2 \left\{ \lambda_{1} \left\{ I_{1}(x,y) - c(x,y) R_{1}(x,y) \right\} \frac{\partial \left\{ c(x,y) R_{1}(x,y) \right\}}{\partial p(x,y)} \right.$$

$$+ \lambda_{2} \left\{ I_{2}(x,y) - c(x,y) R_{2}(x,y) \right\} \frac{\partial \left\{ c(x,y) R_{2}(x,y) \right\}}{\partial p(x,y)}$$

$$+ \lambda_{3} \left\{ I_{3}(x,y) - c(x,y) R_{3}(x,y) \right\} \frac{\partial \left\{ c(x,y) R_{3}(x,y) \right\}}{\partial p(x,y)}$$

【0108】従って、グラディエントp(x,y) は、次式 によって修正される。

[0109]

【数33】

 $p(x,y) = p_{av}(x,y)$ $-\lambda_{1}\left\{I_{1}(x,y)-c(x,y)R_{1}(x,y)\right\}\frac{\partial\left\{c(x,y)R_{1}(x,y)\right\}}{\partial p(x,y)}$ $-\lambda_{2}\left\{I_{2}(x,y)-c(x,y)R_{2}(x,y)\right\}\frac{\partial\left\{c(x,y)R_{2}(x,y)\right\}}{\partial p(x,y)}$ $-\lambda_{3} \left\{ 1_{3} (x,y) - c(x,y) R_{3} (x,y) \right\} \frac{\partial \left\{ c(x,y) R_{3}(x,y) \right\}}{\partial R_{3}(x,y)}$

【0110】数式33で、pav(x,y) は、数式30で表 されるように、画素位置(x,y) の上下左右に隣接する4 つの画素位置でのグラディエントの平均値として計算す ることができる。

【O 1 1 1】次に、数式33で、定数 λ_1 、 λ_2 、及び λ3 は、前述したように、経験的に定められる。また、 数式33で、 Iı (x,y) 、 I2 (x,y) 、及び I3 (x,y) は、前述したように、画素位置(x,y) においてレプリカ 面1を、図1の第1光源2A、第2光源2B、及び第3 光源20の3つの光源によって実際に撮像して得られる 3つの光源方向に対応する3つの明度値である。

20

【0112】更に、数式33において、c(x,y) R ı (x,y) は、数式14と数式17、更に数式18、数式 9、及び数式10より、次式によって表される。

[0113]

【数34】

 $C(x,y) R_1(x,y) = \alpha(x,y) \{\underline{n}_{si} \cdot \underline{n}(x,y)\}$

$$= \alpha(x,y) \quad (n_{s11}, n_{s12}, -(1-n_{s11}^2 - n_{s12}^2)^{1/2})$$

$$\cdot (n_1(x,y), n_2(x,y), -(1-n_1(x,y)^2 - n_2(x,y)^2)^{1/2})$$

$$= \alpha(x,y) \quad (n_{s11}, n_1(x,y) + n_{s12}, n_2(x,y) + (1-n_{s11}^2 - n_{s12}^2)^{1/2})$$

$$\times \{1-n_1(x,y)^2 - n_2(x,y)^2\}^{1/2}\}$$

【0114】ここで、数式11より、次式が成立する。

[0115]

$$p(x,y)^{2} + q(x,y)^{2} + 1 = n_{1}(x,y)^{2} / \{1 - n_{1}(x,y)^{2} - n_{2}(x,y)^{2}\}$$

$$+ n_{2}(x,y)^{2} / \{1 - n_{1}(x,y)^{2} - n_{2}(x,y)^{2}\}$$

$$+ 1$$

$$= 1 / \{1 - n_{1}(x,y)^{2} - n_{2}(x,y)^{2}\}$$

$$\therefore \{1 - n_{1}(x,y)^{2} - n_{2}(x,y)^{2}\}^{1/2} = 1 / \{p(x,y)^{2} + q(x,y)^{2}\}^{1/2}$$

【0116】数式35を数式11に代入することによ り、次式が得られる。

【数36】
$$v)^2 + a(x, y)^2 + 1$$
 1/2

 $n_1(x,y) = p(x,y) / \{p(x,y)^2 + q(x,y)^2 + 1\}^{1/2}$

 $n_2(x,y) = p(x,y) / \{p(x,y)^2 + q(x,y)^2 + 1\}^{-1/2}$

【0118】数式34と数式36より、数式33におけ る項 c (x,y) R₁ (x,y) は、光源方向ベクトル<u>nsl</u>の要 素 n s 11 、 n s 12 と、画素位置 (x , y) における係数 α (x,y) 及びグラディエント (p(x,y), q(x,y)) を用 いて、次式により計算できる。

[0119]

[0117]

【数37】

 $c(x,y) R_1(x,y)$

$$= \alpha(x,y) \frac{\{n_{si1} p(x,y) + n_{si2} q(x,y) + (1-n_{si1}^2 - n_{si2}^2)^{1/2}}{\{p(x,y)^2 + q(x,y)^2 + 1\}^{1/2}}$$

 $= \alpha(x,y) W_1 / G^{1/2}$

10

[0120]

[0121] 【数38】 【数39】

 $G = p(x, y)^{2} + q(x, y)^{2} + 1$

 $W_1 = n_{s11} p(x,y) + n_{s12} q(x,y) + (1 - n_{s11}^2 - n_{s12}^2)^{1/2}$

【0122】数式37と全く同様にして、数式33にお ける項 c (x,y) R2 (x,y) は、光源方向ベクトルns2 の 要素 n s21 、 n s22 と、画素位置(x,y) における係数 α (x,y)及びグラディエント(p(x,y), q(x,y))を用 $C(x,y) R_2(x,y)$

い、次式と数式38により計算できる。 [0123]

【数40】

$$= \alpha(x,y) \frac{\{n_{s21} p(x,y) + n_{s22} q(x,y) + (1-n_{s21}^2 - n_{s22}^2)^{1/2}\}}{\{p(x,y)^2 + q(x,y)^2 + 1\}^{1/2}}$$

 $= \alpha (x, y) W_2 / G^{1/2}$

[0124]
$$W_{z} = n_{sz_{1}} p(x,y) + n_{sz_{2}} q(x,y) + (1 - n_{sz_{1}}^{2} - n_{sz_{2}}^{2})^{1/2}$$

【0125】同様に、数式33における項c(x,y) R3 (x,y) は、光源方向ベクトル<u>ns3</u>の要素 ns31 、ns32 と、画素位置(x,y) における係数 α(x,y) 及びグラディ エント (p(x,y), q(x,y)) を用い、次式と数式38 c(x,y) $R_3(x,y)$

により計算できる。 [0126] 【数42】

$$= \alpha(x,y) \frac{\{n_{s31} p(x,y) + n_{s32} q(x,y) + (1-n_{s31}^2 - n_{s32}^2)^{1/2}\}}{\{p(x,y)^2 + q(x,y)^2 + 1\}^{1/2}}$$

 $= \alpha (x,y) W_3/G^{1/2}$

[0127] 【数43】 $W_3 = n_{s31} p(x,y) + n_{s32} q(x,y) + (1 - n_{s31}^2 - n_{s32}^2)^{1/2}$

【0128】更に、数式33において、項∂ {c(x,y) $R_1(x,y)$ } $/\partial p(x,y)$, $\partial \{c(x,y) R_2(x,y)\}$ /∂p(x,y)、及び∂{c(x,y) Rı (x,y)}/∂p

(x,y)は、それぞれ数式37、数式40、及び数式42 をp(x,y) で偏微分することにより、次の数式44~4 50 6と、数式38、39、41、及び43によって計算で

きる。

【数44】

[0 1 2 9]
$$\partial \{c(x,y) | R_1(x,y)\} / \partial p(x,y)$$

$$= \alpha(x,y) (n_{z11} \{p(x,y)^2 + q(x,y)^2 + 1\}$$

$$-p(x,y) \{n_{sii} p(x,y) + n_{si2} q(x,y) + (1-n_{sii}^2 - n_{si2}^2)^{1/2}\}$$

$$/ \{p(x,y)^2 + q(x,y)^2 + 1\}^{2/2}$$

=
$$\alpha(x,y) \{n_{s11} G - p(x,y) W_1\} / G^{3/2}$$

[0130]

【数45】

 $\partial \{c(x,y) R_z(x,y)\} / \partial p(x,y)$

$$= \alpha(x,y) \{ n_{s21} \{ p(x,y)^2 + q(x,y)^2 + 1 \}$$

$$-p(x,y) \{n_{sz1} p(x,y) + n_{sz2} q(x,y) + (1-n_{sz1}^2-n_{sz2}^2)^{1/2} \}$$

$$/ \{p(x,y)^2 + q(x,y)^2 + 1\}^{3/2}$$

=
$$\alpha(x,y) \{ n_{zz} : G - p(x,y) W_z \} / G^{3/2}$$

[0131]

【数46】

 $\partial \{c(x,y) R_3(x,y)\} / \partial p(x,y)$

$$= \alpha(x,y) (n_{s31} \{p(x,y)^2 + q(x,y)^2 + 1\}$$

$$-p(x,y) \{n_{s31} p(x,y) + n_{s32} q(x,y) + (1-n_{s31}^2-n_{s32}^2)^{1/2}\}$$

$$/ \{p(x,y)^2 + q(x,y)^2 + 1\}^{3/2}$$

$$= \alpha(x,y) \{n_{s31} G - p(x,y) W_3\} / G^{s/2}$$

【0132】以上、数式30、数式37~43、及び数 式44~46を用いることにより、数式33で示される

ができる。

【0133】一方、数式23~25で定義される誤差E 方程式によってグラディエント p(x,y) を修正すること 50 (x,y) を最小にするために、数式 $2.6 \sim 3.6$ の場合と同 様に、誤差 E(x,y) がグラディエント q(x,y) で偏微分される。この結果、上述のグラディエント p(x,y) の場合と同様に、前述した数式 $3.7 \sim 4.3$ と、以下に示される数式 4.8、及び数式 $4.9 \sim 5.1$ を用いることによっ $q(x,y) = q_{av}(x,y)$

て、次の数式 4 7 で示される方程式によってグラディエント q (x,y) を修正することができる。 【 0 1 3 4】 【数 4 7】

$$-\lambda_{1}\left\{I_{1}\left(x,y\right)-c\left(x,y\right)R_{1}\left(x,y\right)\right\}\frac{\partial\left\{c\left(x,y\right)R_{1}\left(x,y\right)\right\}}{\partial q\left(x,y\right)}$$

$$-\lambda_{z}\left\{I_{z}(x,y)-c(x,y)R_{z}(x,y)\right\}\frac{\partial \{c(x,y)R_{z}(x,y)\}}{\partial q(x,y)}$$

$$-\lambda_{3} \left\{ I_{3}(x,y) - c(x,y) R_{3}(x,y) \right\} \frac{\partial \left\{ c(x,y) R_{3}(x,y) \right\}}{\partial q(x,y)}$$
[0135]
[数48]

$$= \frac{1}{4} \left\{ q(x+1,y) + q(x-1,y) + q(x,y+1) + q(x,y-1) \right\}$$

[0136] [数49] ð {c(x,y) R₁(x,y)} / ð q(x,y)

【0137】 【数50】

$$= \alpha(x,y) (n_{s12} \{p(x,y)^2 + q(x,y)^2 + 1\}$$

$$-q(x,y) \{n_{sii} p(x,y) + n_{si2} q(x,y)\}$$

+ $(1-n_{s11}^2-n_{s12}^2)^{1/2}$ }

$$/ \{p(x,y)^2 + q(x,y)^2 + 1\}^{3/2}$$

$$= \alpha(x,y) \{n_{s12} G - q(x,y) W_1\} / G^{3/2}$$

28

 $\partial \{c(x,y) R_2(x,y)\} / \partial p(x,y)$

 $= \alpha(x,y) \quad \{n_{s22} \{p(x,y)^2 + q(x,y)^2 + 1\}$

 $-q(x,y) \{n_{sz1} p(x,y) + n_{sz2} q(x,y) + (1-n_{sz1}^2 - n_{szz}^2)^{1/2} \}$

 $/ \{p(x,y)^2 + q(x,y)^2 + 1\}^{3/2} \}$

 $= \alpha(x, y) \{n_{zzz} G - q(x, y) W_z\} / G^{3/2}$

[0138]

(数51] ∂ {c(x,y) R₃ (x,y) } /∂p(x,y)

 $= \alpha(x,y) \quad (n_{332} \{p(x,y)^2 + q(x,y)^2 + 1\}$

 $-q(x,y) \{n_{s31} p(x,y) + n_{s32} q(x,y) + (1-n_{s31}^2-n_{s32}^2)^{-1/2}\}$

 $/ \{p(x,y)^2 + q(x,y)^2 + 1\}^{3/2}$

$= \alpha (x, y) \{ n_{332} G - q(x, y) W_3 \} / G^{3/2}$

【0139】上述の数式33及び数式47で示されるグ 30 ラディエントp(x,y) 及びq(x,y)の修正方程式は、右 辺のpav(x,y)、qav(x,y)、R1(x,y)、R2(x,y)、及びR3(x,y)が修正済のグラディエントに基づいて計算されている場合に成立する。ところが、各画素位置でグラディエントが推定された直後の初期状態においては、修正済のグラディエントは存在しない。

【0.140】そこで、本発明の実施例においては、グラディエントの修正に緩和法を採用する。即ち、グラディエントの推定値を初期値として計算される pav(x,y)、 qav(x,y)、 $R_1(x,y)$ 、 $R_2(x,y)$ 、 及び $R_3(x,y)$ に基づいて数式 3 及び数式 4 7を計算することにより、各画素位置(x,y) でのグラディエント(p(x,y)、 q(x,y))を修正し、その修正されたグラディエントから計算される pav(x,y)、 qav(x,y) 、 qav(x,y) 、

【0 1 4 1】この結果、各画素位置(x,y) でのグラディ エント (p(x,y) 、 q(x,y)) は、徐々に妥当な値に収 50

東する。このとき、各繰り返しに先立って、前回修正されたグラディエント(p(x,y) 、q(x,y))に基づいて、数式 2 3 によって各画素位置(x,y) での誤差 E(x,y) を計算し、この誤差の全画素の和が十分に小さくなった時点で、グラディエント(p(x,y) 、q(x,y))の値が収束したと判定すればよい。

【0142】なお、数式23の誤差E(x,y)の計算において、s.e(x,y)は数式24によって計算でき、このとき、p.e(x,y)、p.e(x,y)、q.e(x,y)、及びq.e(x,y)は、次式によって計算できる。

40 【0143】 【数52】

$$p_x(x,y) = p(x+1,y) - p(x-1,y)$$

$$p_y(x,y) = p(x,y+1) - p(x,y-1)$$

$$q_{x}(x,y) = q(x+1,y) - q(x-1,y)$$

$$q_{y}(x,y) = q(x,y+1) - q(x,y-1)$$

【0144】また、数式23の誤差E(x,y)の計算において、re(x,y)は数式25によって計算できる。このとき、前述したように、 $I_1(x,y)$ 、 $I_2(x,y)$ 、及び $I_3(x,y)$ は、前述したように、画素位置(x,y)においてレプリカ面1を図1の第1光源2A、第2光源2B、及び第3光源2Cの3つの光源により実際に撮像して得られる3つの光源方向に対応する3つの明度値であり、 λ_1 、 λ_2 、及び λ_3 はそれぞれ経験的に定められる定数であり、C(x,y) $R_1(x,y)$ 、C(x,y) $R_2(x,y)$ 、及びC(x,y) $R_3(x,y)$ は、数式37~43により計算できる。

<本発明による皮膚表面形状の特徴抽出装置の具体的動作>上述の3次元形状復元の原理に基づく図1の皮膚表面形状の特徴抽出装置の具体的動作について、以下に順次説明する。なお、以下の動作フローチャートは、図1のCPU8がROM10に記憶された制御プログラムを実行する動作として実現される。

全体動作

図3は、皮膚表面形状の特徴抽出装置の全体的な処理を 示す動作フローチャートである。

【0145】まず、ステップS301で、3枚のレプリカ面画像が入力され、メモリ9に取り込まれる。次に、ステップS302で、メモリ9に取り込まれた3枚のディジタル画像データの各画素位置の明度値から、レプリカ面画像の各画素位置(x,y) でのレプリカ面1のグラディエント(p(x,y)、q(x,y))が計算される。

【0146】そして、ステップS303で、上述のグラディエント(p(x,y)、q(x,y))から、皮膚表面形状の特徴パラメータが抽出される。

レプリカ面画像の入力

図4は、図3のステップS301のレプリカ面画像の入力処理の動作フローチャートである。

【0147】まず、ステップS401で、CPU8はバス7を介してスイッチ6を制御し、第1光源2Aを点灯させる。次に、ステップS402で、A/D変換器5から得られるディジタル画像データを、バス7を介してメモリ9の第1の画像格納領域に順次取り込む。

【0148】次に、ステップS403で、CPU8はバス7を介してスイッチ6を制御し、第2光源2Bを点灯

させる。そして、ステップS404で、A/D変換器5から得られるディジタル画像データを、バス7を介してメモリ9の第2の画像格納領域に順次取り込む。

【0149】更に、ステップS405で、CPU8はバス7を介してスイッチ6を制御し、第3光源2Cを点灯させる。そして、ステップS406で、A/D変換器5から得られるディジタル画像データを、バス7を介してメモリ9の第3の画像格納領域に順次取り込む。

【0150】以上の処理によって、メモリ9には、レプリカ面1上の撮像領域の各画素位置(x,y) 毎に、3つの明度値 I₁ (x,y)、I₂ (x,y)、及び I₃ (x,y) のデータが得られる。

各画素位置でのグラディエントの計算

図 5 は、図 3 のステップ S 3 0 2 の、レプリカ面画像の各画素位置(x,y) でのレプリカ面 1 のグラディエント (p(x,y)) 、q(x,y))の計算処理の動作フローチャートである。

【0151】まず、ステップS501で、数式18及び数式19を用いて数式21を計算することにより、各画素位置(x,y) での係数 $\alpha(x,y)$ が推定される。なお、数式18で示される3つの光源方向ベクトルnsi、ns2、及びns3 は、第1光源2A、第2光源2B、及び第3光源2Cが設置された時点で決定することができ、予めメモリ9に記憶されている。また、数式19で示される各画素位置(x,y) の3つの明度値I1 (x,y)、I2 (x,y)、及びI3 (x,y) は、図3のステップS303 (図4参照)の処理でメモリ9の第1~第3の画像領域に得られている。

【0152】次に、ステップS502で、ステップS501で得られた各画素位置(x,y) での係数 $\alpha(x,y)$ と、数式9、数式10、数式18、及び数式19を用いて数式22を計算することによって、各画素位置(x,y) での表面法線ベクトルn(x,y) が推定される。

【0153】次に、ステップS503で、ステップS502で求まった各画素位置(x,y) での表面法線ベクトルn(x,y) に基づいて、数式11により、各画素位置(x,y) でのグラディエント(p(x,y) , q(x,y))が推定される。

【0154】続いて、ステップ $S504\sim S509$ の緩和法の処理が実行される。まず、ステップS504で、ステップS503で求まった各画素位置(x,y) でのグラディエント(p(x,y), q(x,y))が、緩和法の繰り返し演算のp(x,y)及びq(x,y) の初期値として、メモリ9の適当な変数領域に設定される。

【0155】次に、ステップS505で、上述のグラディエント(p(x,y)、q(x,y))の前回の値(初回の場合はステップS504で設定された初期値、それ以後はステップS508とS509で計算された値)に基づいて、数式24、数式52、数式25、及び数式 $37\sim43$ を用いて数式23を計算することにより、各画素位置

32

(x,y) での誤差 E(x,y) が計算される。ここで、数式5 2の右辺は、各画素位置(x,y) の上下左右に隣接する4 つの画素位置でのグラディエントの前回の値に基づいて 計算される。また、数式38の右辺は、グラディエント (p(x,y), q(x,y))の前回の値に基づいて計算さ れ、数式39、41、43の右辺はグラディエント(p (x,y) 、q(x,y)) の前回の値と、予めメモリ9に記憶 されている3つの光源方向ベクトル<u>nsl</u>、<u>ns2</u>、及び<u>n</u> s3 の各要素に基づいて計算され、更に、数式37、4 0、42の右辺は、上述の数式38、39、41、及び 43の計算結果と、ステップS501で計算された係数 α (x,y) に基づき計算される。また、数式25で、定数 λ_1 、 λ_2 、及び λ_3 は、前述したように経験的に定め られて予めメモリ9に得られており、 Iı(x,y)、 Iz (x,y) 、及び 13 (x,y)は、図3のステップ S 3 0 3 (図4参照)の処理でメモリ9の第1~第3の画像領域 に得られている。

【0156】続いて、ステップS506においては、ステップS505で計算された各画素位置(x,y)での誤差 E(x,y)の全画素についての総和が計算される。そして、ステップS507では、ステップS506で計算された誤差の総和が所定の閾値以下になったか否かが判定される。

【0157】ステップS507の判定がNOなら、ステ ップS508とS509で、グラディエント(p(x,y) 、q(x,y)) が修正される。即ち、ステップS508 では、ステップS505における数式37~43の計算 結果と、数式30、及び数式44~46を用いて数式3 3が計算されることにより、グラディエント p (x,y) が 修正される。ここで、数式30の右辺は、各画素位置 (x,y) の上下左右に隣接する4つの画素位置でのグラデ ィエントの前回値の平均値として計算される。また、数 式44~46の右辺は、ステップS505で計算された 数式38、39、41、及び43の計算結果と、グラデ ィエントp(x,y) の前回値と、予めメモリ9に記憶され ている3つの光源方向ベクトル<u>ns1</u>、<u>ns2</u>、及び<u>ns3</u>の 各第1要素と、ステップS501で計算された係数 a (x,y)に基づいて計算される。更に、数式33で、定数 λ_1 、 λ_2 、及び λ_3 は、前述したように経験的に定め られて予めメモリ9に得られており、「1 (x,y)、「 2(x,y) 、及び I 3 (x,y) は、図3のステップ S 3 O 3 (図4参照)の処理でメモリ9の第1~第3の画像領域 に得られている。

【0158】また、ステップS509では、ステップS505における数式37~43の計算結果と、数式48、及び数式49~51を用いて数式47が計算されることにより、グラディエントq(x,y)が修正される。ここで、数式48の右辺は、各画素位置(x,y)の上下左右に隣接する4つの画素位置でのグラディエントの前回値の平均値として計算される。また、数式49~51の右50

辺は、ステップS505で計算された数式38、39、41、及び43の計算結果と、グラディエントq(x,y)の前回値と、予めメモリ9に記憶されている3つの光源方向ベクトル n_{51} 、 n_{52} 、及び n_{53} の各第2要素と、ステップS501で計算された係数 $\alpha(x,y)$ に基づいて計算される。更に、数式47で、定数 λ_1 、 λ_2 、及び λ_3 は、前述したように経験的に定められて予めメモリ9に予め得られており、 $I_1(x,y)$ 、 $I_2(x,y)$ 、及び $I_3(x,y)$ は、図3のステップS303(図4参照)の処理でメモリ9の第1~第3の画像領域に得られている。【0159】その後、ステップS505、S506が再び実行されて各画素位置(x,y) での誤差E(x,y) 及びその誤差の全画素位置についての総和が計算され、ステップS507でその誤差の総和が所定の閾値以下になっていないと判定される間はステップS508~S507の

【0160】そして、ステップS507で上述の誤差の総和が所定の閾値以下になったと判定されると、各画素位置(x,y)でのグラディエント(p(x,y),q(x,y))は妥当な値に収束したといえるため、ステップS510で、最終的に得られた各画素位置(x,y)でのグラディエント(p(x,y),q(x,y))がメモリ9に格納され、これにより、図3のステップS302の処理を終了する。鳥瞰図による考察

次に、図3のステップS303の皮膚表面形状の特徴パラメータの抽出処理について説明する前に、上述の処理によって得られた各画素位置(x,y)におけるグラディエント(p(x,y),q(x,y))に基づいて復元されるレプリカ面103次元形状の例について説明する。

【0161】各画素位置(x,y) でのグラディエント(p(x,y)、q(x,y))を求めることができれば、それらをレプリカ面画像上で一定の方向に積分することによって、各画素位置(x,y) におけるz 座標の値を求めることができ、レプリカ面1の3次元形状を復元することができる。

【0162】図6は、そのようにして復元されたレプリカ面1の3次元形状を鳥瞰図として示した図である。この図からわかるように、皮溝領域では、グラディエントが大きく変化することにより、-z方向にV字型に切れ込んでいることがわかる。

【0163】また、皮溝と皮溝の交点付近においても、 グラディエントが大きく変化することにより、-z方向 に特徴的な形状を呈することがわかる。これに対して、 皮丘領域ではグラディエントの変化が少なく、平面に近 い形状を呈する。

皮膚占有率の抽出

処理が繰り返される。

以上の考察に基づく、図3のステップS303の皮膚表面形状の特徴パラメータの抽出処理について、図7の動作フローチャートに沿って説明する。

【0164】まず、ステップS701では、皮溝占有率

が抽出される。皮溝占有率は、皮溝領域のレプリカ面画 像全体に対する面積率で定義され、皮溝と皮溝の交点 (毛孔を含む)の領域も皮溝に含まれる。

【0165】ここでの処理の動作フローチャートを図8 に示す。図8において、まず、ステップ8801で、各 画素位置(x,y) 毎に、図3のステップS302で計算さ れたグラディエント(p(x,y)、q(x,y))を用いて、 次式によりグラディエント強度が計算される。この物理 量は、各画素位置(x,y)でのレプリカ面1の傾きの強さ を示している。

[0166]

【数53】

(グラディエント強度) = {p(x,y)²+q(x,y)²} 1/2

【0167】次に、ステップS802で、所定の閾値以 上のグラディエント強度を有する画素位置(x,y) が抽出 され、その画素に当該画素が皮溝であることを示すラベ ルが付与される。この結果、レプリカ面画像において皮 溝領域の画素が抽出される。なお、数式53で用いられ る各画素位置(x,y) でのグラディエント(p(x,y),q)(x,y)) は、前述したように緩和法のアルゴリズムによ って決定された値であるため、上述のような簡単な閾値

処理によって容易に皮溝領域を検出できる。

【0168】最後に、ステップS803で、次式により 皮溝占有率が計算され、その計算結果が、メモリ9に格 納されると共にプリンタ11又はCRTディスプレイ1 2に出力される。

[0169]

【数54】

(皮溝占有率) = (皮溝領域の画素数) / (絵画素数)

【0170】以上のようにして計算される皮溝占有率 は、皮溝と皮溝の交点(毛孔を含む)の領域の広さを示 す特徴パラメータとなる。一般に、人間の皮膚は、加齢 と共に、皮溝の密度が減少するため、上述のようにして 皮溝占有率を直接評価できることは重要である。

皮溝方向の標準偏差及びヒストグラムの抽出

図7のステップS702では、皮溝方向の標準偏差及び ヒストグラムが抽出される。皮溝方向は皮溝の長手方向 として定義される。

(グラディエント方向) $= tan^{-1} \{q(x,y) / p(x,y)\}$

【0173】皮溝領域におけるグラディエント方向は、 皮溝方向に垂直な方向、即ち皮溝の幅方向を示す。従っ て、ステップS902で、次式により上述のグラディエ ント方向に π \angle 2 [rad] が加算され、その結果、皮 溝方向が抽出される。

[0174]

【数56】

(皮溝方向) =(グラディエント方向)+ π / 2

【0175】そして、ステップ 5903では、このよう にして求まった各画素位置(x,y) における皮溝方向につ いて、皮溝領域全体の標準偏差及びヒストグラムが計算 40 されて、その計算結果が、メモリ9に格納されると共に プリンタ11又はCRTディスプレイ12に出力され

【0176】以上のようにして求まる皮滯方向の標準偏 差が小さい場合、レプリカ面画像全体において皮溝が一 定方向に流れていることを示し、標準偏差が大きい場 合、レプリカ面画像全体において皮溝が縦横に走ってい ることを示している。また、ヒストグラムを検査するこ とにより、皮溝方向の分布も抽出することができる。

【0177】一般に、人間の皮膚は、加齢と共に、皮溝

【0171】ここでの処理の動作フローチャートを図9 に示す。図9において、まず、ステップS901で、図 8のステップS802で求まった皮溝領域の画素(x,y) について、次式によってグラディエント方向が計算され る。このグラディエント方向は、例えば $-\pi/2$ から π /2 [rad]の範囲で計算される。

[0172]

【数55】

に関する放射状の均質性が失われ、皮溝が一定方向に流 れる傾向を呈するため、上述のようにして皮溝方向を直 接評価できることは重要である。

皮溝底の深さの平均と標準偏差及びヒストグラムの抽出 図7のステップS703では、皮溝底の深さの平均と標 準偏差及びヒストグラムが抽出される。皮溝底の深さは 皮溝の形状を決定する最も重要なパラメータである。

【0178】今、図2より、レプリカ面1に関する座標 は図10のように定義されるため、例えば皮溝領域にお ける深さの空間 1 次微分であるグラディエント (p(x. y) 、 q (x,y)) の符号及び深さの空間 2 次微分である

ラプラシアンは図面のようになる。このような性質を利 用して、図11の動作フローチャートで示されるアルゴ リズムにより皮溝底の画素とその深さに関する情報が抽 出される。

【0179】図11において、まず、ステップS110 1で、レプリカ面画像の各画素位置(x,y) 毎にレプリカ 面1の深さの空間2次微分、即ち、ラプラシアンが計算 される。ここで、深さ値は直接には求まっていないた め、グラディエント p (x,y) 及び q (x,y) の空間 1 次微 分 p x (x , y) 及び q y (x , y) を計算し、それらの線形結合を 求めることにより、ラプラシアンを計算することができ

できる。

る。なお、px(x,y)及びqy(x,y)は、図3のステップS302に関する図5のステップS505で数式52により計算されるため、ステップS505の計算時に次式を同時に計算し、その計算結果をラプラシアンとしてメモリ9に記憶させておけばよい。

[0180]

-【数57】

$(j \mathcal{T} j \mathcal{Y} \gamma) = p_x (x, y) + q_y (x, y)$

【0181】次に、ステップS1102で、レプリカ面画像全体で、ラプラシアンが所定の閾値以上の正の極大値となる画素が探索され、それを満たす1つの画素が皮溝底の画素候補として抽出される。

【0182】皮溝底の画素候補が見つかると、ステップ S1103の判定がYESとなり、次に、ステップS1 104において、皮溝底の画素候補の周囲の直近画素内 に、図7のステップS701に関する図8のステップS 802で求まっている皮溝領域が存在するか否かが探索 される。

【0183】皮溝領域が見つからない場合には、当該皮溝底の画素候補は皮溝底の画素ではないと判定できるため、ステップS1105の判定結果がNOとなってステップS1102に戻る。一方、皮溝領域が見つかった場合には、当該皮溝底の画素候補は皮溝底の画素であると判定できるため、ステップS1105の判定結果がYESとなって、ステップS1106に進む。

【0184】ステップS1106では、上述の皮溝画素候補が皮溝画素としてラベル付けされる。続いて、ステップS1107とS1108において、積分に関する処理が実行される。今、図10に示されるように、皮溝底の画素での深さは、皮溝底の画素から、それが含まれる皮溝の端の画素までの高さであると定義できる。そこで、皮溝底の画素から皮溝の端の画素までグラディエントを積分することにより、皮溝底の画素の深さを求めることができる。

【0185】まず、ステップS1107で、積分方向を x 方向とするか y 方向とするかが決定される。即ち、ス テップS1104において検出された皮溝領域内の所定 範囲の画素のグラディエント(p(x,y)、q(x,y))の 平均値が計算され、 p(x,y)の平均値の方が大きけれ ば、その皮溝底の画素が含まれる皮溝領域の皮溝方向は 図12に示されるように y 方向に近い方向を向いている と推定できるため、探索が皮溝の幅方向に近い方向に対 して行われるように、x方向が探索方向として決定され る。逆に、q(x,y)の平均値の方が大きければ、その皮 構底の画素が含まれる皮溝領域の皮溝方向は図13k示 されるように x 方向に近い方向を向いていると推定でき るため、探索が皮溝の幅方向に近い方向に対して行われ るように、y方向が探索方向として決定される。これに より、皮溝方向に積分が行われてしまい、積分路が皮溝 から抜け出せなくなってしまうという事態を防ぐことが 【0186】また、ステップS1107では、上述のように決定されたx方向又はy方向において、有効な明度値が得られている正又は負の何れかの方向を積分方向とする判別も行われる。これは、光源の照明方向と皮溝方向との関係で、照明の影になる部分が生じる可能性があり、その影の部分ではグラディエントが正しく求まっていない可能性があるため、そのような影の部分が含まれる方向を避けるためである。有効な明度値が得られているか否かは、例えば、第1光源2A、第2光源2B、及び第3光源2Cによるレプリカ面1の各照明動作に対応してメモリ9に格納された3枚の画像データのそれぞれにつき、画像全体の明度値の分布を調べ閾値処理を行うことにより、各画素毎に有効な明度値が得られているか否かを予めラベル付けしておく等の処理を行うことで、判別することができる。

36

【0187】ステップS1108では、ステップS1107で決定された積分方向に、図7のステップS701に関する図8のステップS802で求まっている皮溝領域の範囲で積分処理が実行される。この場合、x方向に積分が行われる場合にはグラディエントp(x.y)が積分され、y方向に積分が行われる場合にはグラディエントq(x.y)が積分される。

【0188】積分の結果得られた積分値は、ステップS1109で、当該皮溝底の画素での深さとしてメモリ9に記憶される。その後、再びステップS1102に戻り、レプリカ面画像上で、ラプラシアンが所定の閾値以上の正の極大値となる画素が更に探索され、それを満たす1つの画素が皮溝底の画素候補として抽出され、それに対してステップS1104~S1109の処理が繰り返される。

【0189】ラプラシアンが所定の閾値以上の正の極大値となる画素が見つからなくなったら、ステップS110の3の判定がNOとなり、ステップS1110に進む。ステップS1110では、ラベル付けされた皮溝底の画素の深さのレプリカ面画像全体での平均と標準偏差及びヒストグラムが計算され、その計算結果が、メモリ9に格納されると共にプリンタ11又はCRTディスプレイ12に出力される。

【0190】一般に、人間の皮膚は、加齢と共に、皮溝の深さは浅くなり皮溝が不鮮明となるため、上述のようにして皮溝の深さを直接評価できることは重要である。 皮溝幅の平均と標準偏差及びヒストグラムの抽出 図7のステップS704では、皮溝幅の平均と標準偏差 及びヒストグラムが抽出される。

【0191】ここでの処理の動作フローチャートを図14に示す。まず、ステップS1401で、前述した図7のステップS703に関する図11のステップS1106で抽出された皮溝底の画素毎に、前述した図11のステップS1108で実行された積分処理における積分画

素数が抽出される。なお、積分画素数は、例えば、ステ ップS1108の積分処理が実行されるときにカウント し、積分終了時にステップS1109において、皮溝底 の画素に対応させてメモリ9に記憶させておけばよい。 【0192】次に、ステップS1402で、上述の積分 画素数に基づいて、皮溝底の画素毎に皮溝幅が計算され (皮膚底の画業での皮膚幅) る。前述した図11のステップS1108でx方向に積 分が実行された場合、皮溝底の画素での積分画素数と、 そこでの皮溝幅との関係は、図15に示される。そこ で、次式により皮溝底の画素での皮溝幅が計算される。 [0193]

れ、その計算結果が、メモリ9に格納されると共にプリ

【数58】

= 2× (皮溝底の画業での積分画素数)

×(積分路上の平均のグラディエント方向の余弦値)

【0194】また、図11のステップS1108でy方 向に積分が実行された場合、皮溝底の画素での積分画素 数と、そこでの皮溝幅との関係は、図16に示される。 そこで、次式により皮溝底の画素での皮溝幅が計算さ (皮溝底の箇業での皮溝幅)

ンタ11又はCRTディスプレイ12に出力される。 [0195]

【数59】

=2×(皮溝底の画素での積分画素数)

×(積分路上の平均のグラディエント方向の正弦値)

【0196】 ここで、数式58又は数式59で使用され る積分路上の平均のグラディエント方向は、例えば、ス テップS1108の積分処理が実行されるときに、積分 される画素について図7のステップS702に関する図 9のステップ S 9 0 1 で計算されているグラディエント 方向を加算し、積分終了時にステップS1109におい てその加算値を積分画素数で除算することにより求める

ことができ、ステップ S 1 1 0 9 において、そのように して求まったグラディエント方向の平均値を皮溝底の画 素に対応させてメモリ9に記憶させておけばよい。

【0197】皮溝幅は、皮溝底の深さと共に、人間の皮 膚の加齢状態を知るための指標となるため、上述のよう にして皮溝幅を直接評価できることは重要である。 皮溝セグメントの抽出

図7のステップS705では、皮溝底の画素を結ぶ線 分、即ち、皮溝セグメントが抽出される。

【0198】ここでの処理の動作フローチャートを図1 7に示す。まず、ステップ S 1 7 0 1 で、前述した図 7 のステップS703に関する図11のステップS110 6で抽出された皮溝底の画素毎に皮溝セグメントのラベ 40 ルが付与される。

【0199】この場合、図18又は図19に示されるよ うな各種オペレータの中央の黒丸で示される画素を現在 着目している皮溝底の画素に合わせ、その周辺の白丸で 示される画素のみに皮溝底の画素が存在するか否かを判 別することにより、ラベル付けが行われる。

【0200】ここで、図18に示される何れかのオペレ ータが適合した場合、現在着目している皮溝底の黒丸画 素は、皮溝セグメントの途中の画素である。そして、白 丸の何れの画素にもラベルが付与されていない場合は、

現在着目している皮溝底の黒丸画素及び白丸で示される 他の皮溝底の画素に、新たな共通のラベルが付与され て、その情報をメモリ9に記憶される。また、白丸の何 れかの画素にラベルが付与されている場合は、そのラベ ルを現在着目している皮溝底の黒丸画素及び他の白丸で 示される皮溝底の画素に付与され、その情報がメモリ9 に記憶される。

【0201】一方、図19に示される何れかのオペレー タが適合した場合、現在着目している皮溝底の黒丸画素 は、皮溝セグメントの端点の画素である。そして、白丸 の画素にラベルが付与されていない場合は、現在着目し ている皮溝底の黒丸画素と白丸で示される他の皮溝底の 画素に、新たな共通のラベルが付与され、その情報がメ モリ9に記憶される。また、白丸の画素にラベルが付与 されている場合は、そのラベルを現在着目している皮溝 底の黒丸画素に付与され、その情報がメモリ9に記憶さ れる。更に、現在着目している皮溝底の黒丸画素に付与 されたラベルに対応させて、当該黒丸画素の位置と、そ の位置が当該ラベルが付与されている皮溝セグメントの 端点であることを示す情報がメモリ9に記憶される。

【0202】次に、ステップS1702で、各ラベルの 種類毎に、当該ラベルに対応する皮溝セグメントの両端 の端点位置の情報がメモリ9から読み出されて、2つの 端点位置間の直線距離が計算され、その計算結果が当該 ラベルに対応する皮溝セグメントの長さ(皮溝セグメン ト長) として抽出され、当該ラベルに対応させてメモリ 9に記憶される。

【0203】続いて、ステップS1703で、メモリ9 から、ラベルの種類の数が読み出され、その数がレプリ カ面画像中の皮溝セグメントの本数として抽出され、そ

の結果が、メモリ9に格納されると共にプリンタ11又はCRTディスプレイ12に出力される。

【0204】更に、ステップS1704で、メモリ9から、ステップS1702で抽出された皮溝セグメント長が読み出され、それらの平均と標準偏差及びヒストグラムが抽出され、その結果が、メモリ9に格納されると共にプリンタ11又はCRTディスプレイ12に出力される。

【0205】一般に、人間の皮膚は、加齢と共に、皮溝の数は減少し、皮溝の長さは長くなるため、上述のようにして皮溝セグメントの本数及び皮溝セグメント長を直接評価できることは重要である。

毛孔の存在率、深さ、及び大きさの抽出

最後に、図7のステップS706では、皮溝セグメント の交点における毛孔の存在率、深さ、及び大きさが抽出 される。

【0206】ここでの処理の動作フローチャートを図20に示す。始めに、ステップS2001では、皮溝セグメントの交点の領域(交点領域)が抽出される。

【0207】そのために、まず、図7のステップS701で抽出された皮溝領域の画素のうち、図7のステップS703に関する図11のステップS1106で抽出された皮溝底画素について図11のステップS1108で実行された積分処理の対象とならなかった画素が、交点領域の候補として抽出される。今、図21の斜線部として示されるように、皮溝の交点領域は皮溝底の積分処理の対象とならない可能性が強い。従って、上述のように抽出された交点領域の候補に交点領域が含まれると推定することができる。

【0208】次に、交点領域の候補が連続する領域毎に 30分割されてそれぞれにラベルが付され、その情報がメモリ9に記憶される。続いて、図7のステップS705で抽出されメモリ9に記憶されている各皮溝セグメントの各端点位置毎に、その端点位置から所定範囲内に上述の交点領域の候補が存在するか否かが判定され、存在する場合には、当該交点領域の候補のラベルに当該皮溝セグメントのラベルが対応付けられ、その情報がメモリ9に記憶される。

【0209】上述の処理の後、2つ以上の皮溝セグメントのラベルが付与されている交点領域の候補が交点領域 40として抽出され、その情報(ラベル)がメモリ9に記憶される。

【0210】ステップS2002では、ステップS2001で抽出された各交点領域の深さが抽出される。まず、各交点領域毎に、それに接続されている1つの皮溝セグメントが決定される。

【0211】そして、決定された皮溝セグメントの当該 交点領域側の端点位置の皮溝底画素について、図7のス テップS703で抽出された当該皮溝底画素の深さ情報 がメモリ9から読み出され、その深さを初期値として、 当該皮溝底画素から交点領域の側に向かって、各画素位 置のグラディエントが積分される。

【0212】この場合に各画素位置では、p(x,y) 及び q(x,y) のうち、負の符号を有し絶対値が大きい方のグラディエントが選択されて積分され、p(x,y) が積分された場合には+x方向に1 画素移動し、q(x,y) が積分された場合には+y方向に1 画素移動して、更に積分処理が繰り返される。

【0213】そして、深さが最も深くなった時点で積分処理を終了し、その深さ情報が交点深さ情報の候補としてメモリ9に記憶される。上述の積分処理は、現在着目している交点領域に接続されている全ての皮溝セグメントについて同様に実行される。そして、全ての皮溝セグメントについて得られた交点深さ情報の候補のうち最も深さの深い値が、現在着目している交点領域の深さとして抽出される。

【0214】続いて、ステップS2003では、ステップS2001で抽出された交点領域のそれぞれについて、ステップS2002で抽出された当該交点領域の深さが所定の閾値より深いか否かが判定されることにより、当該交点領域が毛孔か否かが判定される。毛孔は一般に深く切れ込んでおり、一方、毛孔でない単なる交点の深さは皮溝底の深さと余り変らない。従って、交点領域の深さを判定することにより毛孔を抽出することができる。毛孔と判定された交点領域については、毛孔である旨のラベルが付され、その情報がメモリ9に記憶される

【0215】更に、ステップS2004では、ステップS2003で抽出された毛孔について、その大きさが抽出される。交点領域においては、それに接する皮溝セグメントは各皮溝の皮溝幅で接するとモデル化できるため、毛孔の交点領域について、それに接する各皮溝セグメントの皮溝幅によって囲まれた交点領域の画素数を適当なアルゴリズムで抽出することにより、毛孔の大きさを抽出できる。このように検出された毛孔の大きさの情報は、メモリ9に記憶される

最後に、ステップS2006では、ステップS2001で抽出された交点領域の数に対するステップS2003で抽出された毛孔の数の割合が毛孔の存在率として抽出され、更に、毛孔の深さの平均と標準偏差及びヒストグラム、毛孔の大きさの平均と標準偏差及びヒストグラムが抽出され、その結果が、メモリ9に格納されると共にプリンタ11又はCRTディスプレイ12に出力される

【0216】一般に、毛孔は、人間の皮膚の加齢状態を知るための指標となり、例えば毛孔の大きさは加齢と共に大きくなる傾向を呈するため、上述のようにして毛孔を直接評価できることは重要である。

【0217】以上説明した皮膚表面形状の特徴抽出装置によれば、レプリカ面1の3次元形状をグラディエント

42

を介して抽出できることにより、皮溝占有率、皮溝方向、皮溝の深さ、皮溝幅、皮溝セグメントの本数及び皮溝セグメント長、並びに毛孔の存在率、深さ及び大きさなどを、詳細に評価することができるようになる。 <他の実施例>なお、図1のCRTディスプレイ12 に、図6に示されるようなレプリカ面1の3次元形状の 鳥瞰図を演算し表示させるように構成してもよい。

【0218】また、図3のステップS302のグラディエントの計算処理に関する図5の動作フローチャートにおいて、光源の照明方向と皮溝方向との関係で照明の影になる部分については、グラディエント(p(x,y), q(x,y))の推定及び緩和法による修正は行わないようにすることにより、グラディエントの計算精度を高めることができる。この場合、図7のステップS703に関する図11のステップS1108の積分処理が実行される際に、ステップS1107において積分方向として有効な明度値が得られている方向のみが選択されるように処理されるため、皮溝底画素の深さの計算などにおいて不都合は生じない。

【0219】更に、上述の実施例では、レプリカ面1は、第1光源2A、第2光源2B、及び第3光源2Cの3つの光源によって照明されたが、もっと多くの光源によって照明を行い、各画素位置毎に、影を生じない照明に対応する3つの明度値を選択してグラディエントを推定及び緩和法により修正するようにすれば、全ての画素位置のグラディエントを正確に求めることも可能である。

【0220】加えて、1つの光源をレプリカ面1の周囲で回転させながら複数回照明するように構成することも可能である。なお、数式23の誤差E(x,y)を計算する 30 ための数式25の λ_1 、 λ_2 、 λ_3 は、前述したように、各々が乗算される各光源方向の2乗誤差項の誤差E(x,y)に対する寄与率を定める定数であり、上述の実施例では経験的に定められるようにしたが、例えば、レプリカ面画像の入力状態に応じてダイナミックに変化させてもよい。

【0221】一方、上述の実施例ではレプリカ面画像から皮膚表面形状の特徴を抽出するようにしたが、条件によって、皮膚表面を直接撮像した画像から皮膚表面形状の特徴を抽出するようにしてもよい。

【0222】更に、上述の実施例で説明した皮膚表面形状の特徴パラメータを抽出するためのアルゴリズムは一例であり、他にも様々なアルゴリズムが適用可能である。例えば、皮膚占有率の計算において、元々の明度値の画像データを組合せて判定したり、皮溝領域の端ではラプラシアンが変化(図10では負に変化)する事実を利用したり、更に、皮溝セグメントを皮溝領域全体の領域分割の手法によって抽出したりするアルゴリズムが考えられる。

[0223]

【発明の効果】本発明によれば、皮膚表面形状の3次元形状を各画素位置での勾配を介して抽出できるため、皮満の形状の領域、面積、方向、深さ、幅、長さ、又は数に関する特徴情報、或いは、皮溝の交点領域の形状の領域、そこでの毛孔の存在する割合、毛孔の深さ、又は大きさに関する特徴情報などを詳細に評価することが可能となる。

【0224】このように、本発明は、従来間接的にしか評価できなかった皮膚表面形状の特徴を、その形状を直接示す特徴情報によって評価できるようになるため、評価誤差を大幅に軽減することが可能となる。

【0225】また、本発明の構成は、小型の撮像装置と、携帯型のマイクロコンピュータなどによって容易に実現できるため、詳細な客観的評価を誰でも容易に得ることが可能となり、医院、又は薬局や化粧品店等の店頭などにおいて手軽に使用することができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明による皮膚表面形状の特徴抽出装置の構成図である。

【図2】3次元形状復元の原理に関する説明図である。

【図3】皮膚表面形状の特徴抽出装置の全体的な処理を 示す動作フローチャートである。

【図4】レプリカ面画像の入力処理の動作フローチャートである。

【図5】各画素位置でのグラディエントの計算処理の動作フローチャートである。

【図6】レプリカ面1の3次元形状の鳥瞰図である。

【図7】皮膚表面形状の特徴パラメータの抽出処理の動作フローチャートである。

【図8】皮膚占有率の抽出処理の動作フローチャートで ある。

【図9】皮溝方向の標準偏差及びヒストグラムの抽出処理の動作フローチャートである。

【図10】皮膚の形状とラプラシアンとの関係の説明図である。

【図11】皮溝底の深さの平均と標準偏差及びヒストグラムの抽出処理の動作フローチャートである。

【図12】積分方向の決定処理の説明図(その1)である。

40 【図13】積分方向の決定処理の説明図(その2)である。

【図14】皮溝幅の平均と標準偏差及びヒストグラムの 抽出処理の動作フローチャートである。

【図15】皮溝底の画素での積分画素数と皮溝幅の関係の説明図(その1)である。

【図16】皮溝底の画素での積分画素数と皮溝幅の関係の説明図(その2)である。

【図17】皮溝セグメントの抽出処理の動作フローチャ ートである。

50 【図18】皮溝セグメントを抽出するためのオペレータ

.

【図19】皮溝セグメントを抽出するためのオペレータを示した図(その2)である。

【図20】毛孔の存在率、深さ、及び大きさの抽出処理 の動作フローチャートである。

【図21】交点領域の抽出処理の動作フローチャートである。

【符号の説明】

1 レプリカ面

を示した図(その1)である。

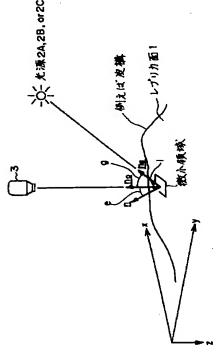
- 2 A 第1光源
- 2B 第2光源
- 2 C 第3光源

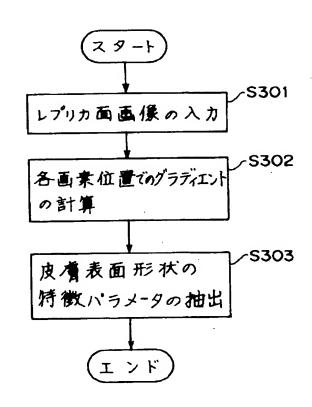
- 拡大光学系
- 撮像装置
- 5 A/D変換器
- 6 スイッチ
- 7 バス
- 8 CPU
- 9 メモリ
- 10 ROM
- 11 キーボード
- o 12 プリンタ
 - 13 CRTディスプレイ

【図2】

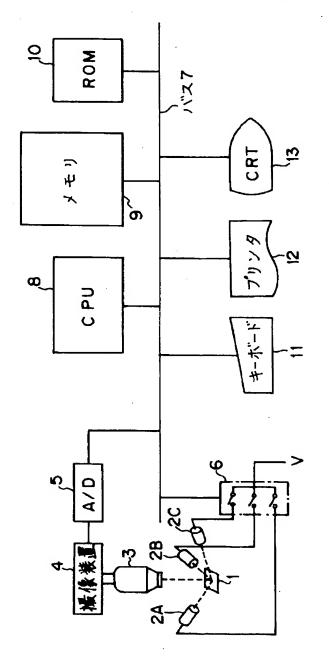
【図3】

3次元形状復元の原理に関する説明図 皮膚表面形状の特徴抽出装置の全体的な 処理を示す動作フローチャート





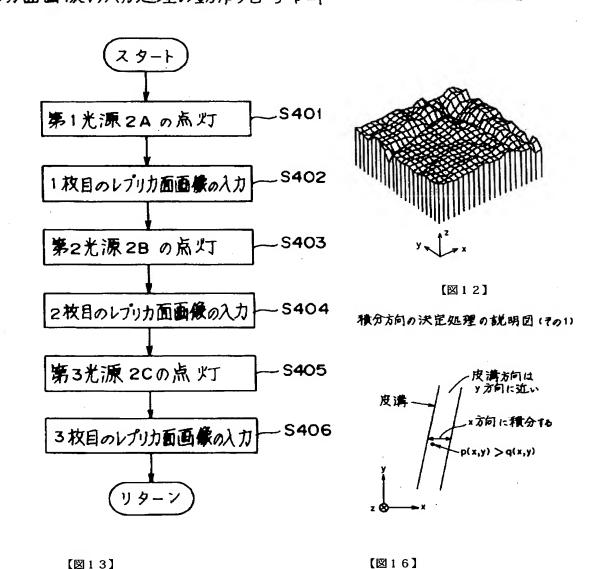
[図1] 本発明による皮膚表面形状の特徴 抽出装置の構成図



[図6]

【図4】

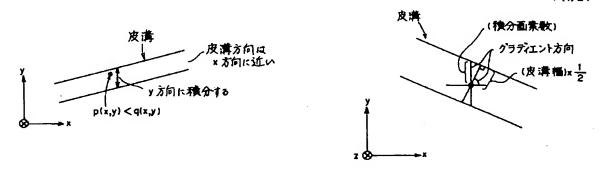
レプリカ面1の3次无形状の鳥 瞰図 レプリカ面画像の入力処理の動作フローチャート



【図13】

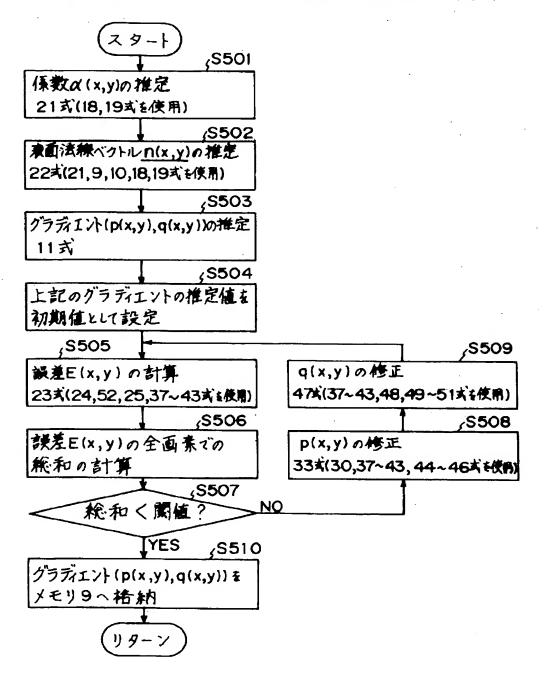
積分方向の決定処理の説明図(その2)

皮濃度の画素での種分画素数と皮満幅の関係の説明団



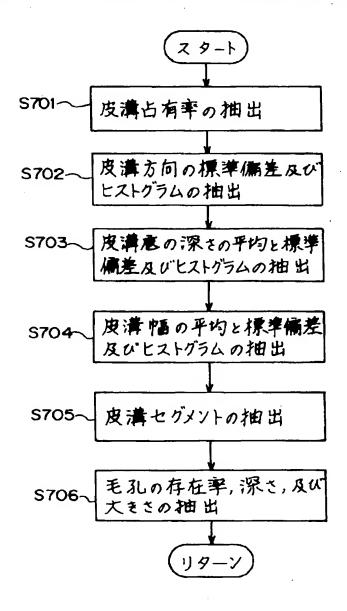
【図5】

各画素位置でのグラディエントの計算処理の動作フローチャート



【図7】

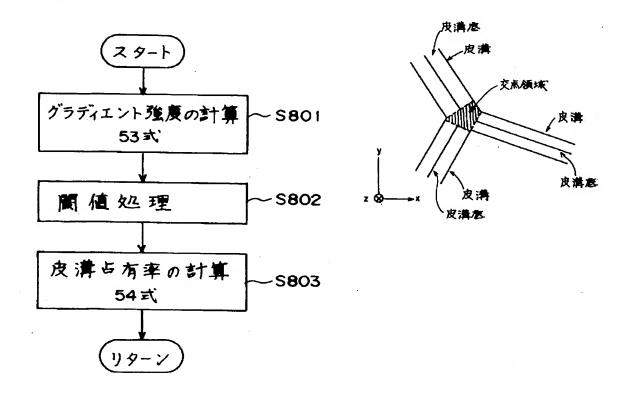
皮膚表面形状の特徴パラメータの抽出処理動作フローチャート



【図8】

【図21】

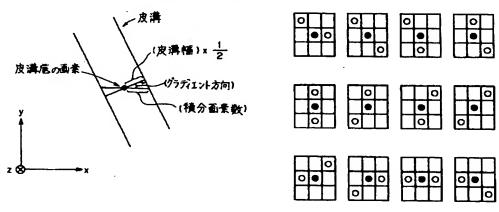
皮溝占有率の抽出処理の動作フローチャート 交点領域の抽出処理の説明图



【図15】

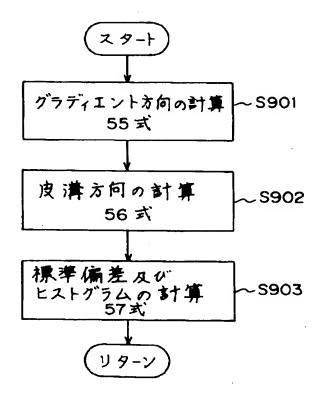
【図18】

皮満底の画素での積分画素数と皮満幅の関係の説明図 皮満セグメントを抽出ねためオペレタも示した図 (その1)



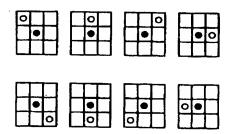
[図9]

皮溝方向の標準偏差 及びヒストグラムの 抽出処理の動作フローチャート



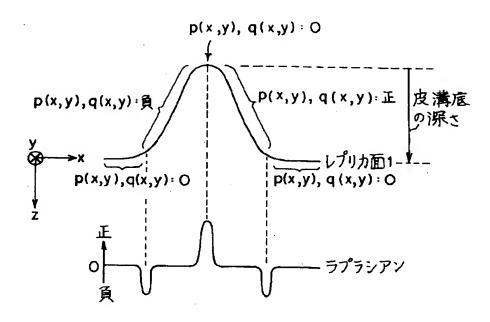
【図19】

皮溝セグメントを抽出するためのオペレータを示した図(その2)



【図10】

皮溝の形状とラプラシアンとの関係の説明図



【図14】

皮溝幅の平均と標準偏差及びヒストグラムの抽出処理の動作フローチャート

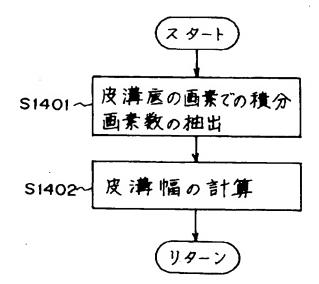
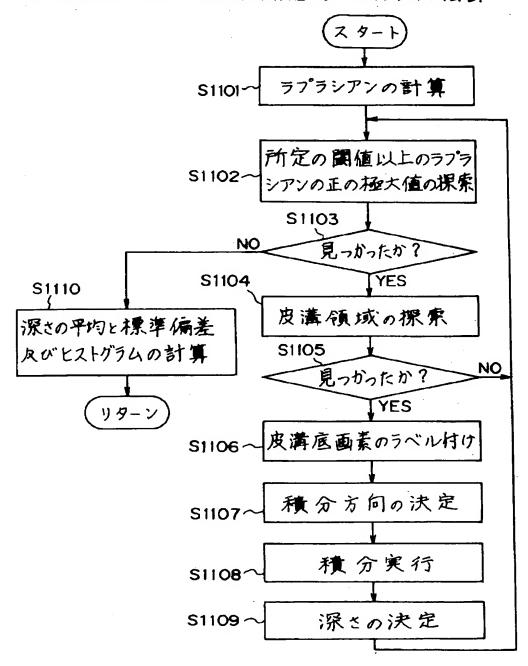
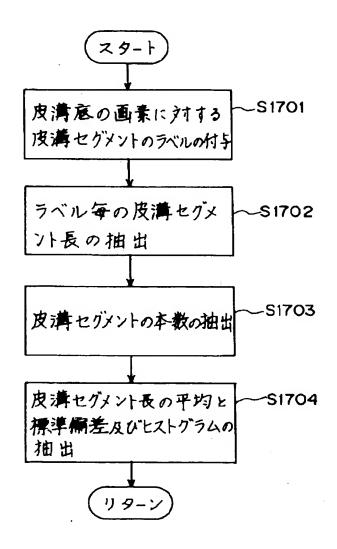


図11] 皮溝底の深さの平均と標準偏差及びヒストクラムの抽出

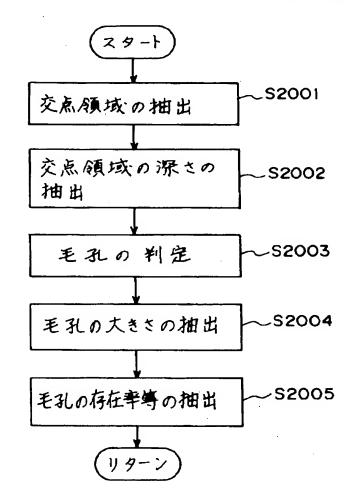


[図17] 皮溝セグメントの抽出処理の動作フローチャート



【図20】

毛孔の存在率, 深さ, 及び大きさの抽出処理の動作 フローチャート



フロントページの続き

(72)発明者 川尻 康晴

神奈川県横浜市港北区新羽町1050 資生堂 研究所内 (72)発明者 矢内 基裕

神奈川県横浜市港北区新羽町1050 資生堂

研究所内

(72)発明者 小沢 慎治

神奈川県鎌倉市岡本 1-19-3-305

THIS PAGE BLANK (USPTO)